

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第3629244号
(P3629244)

(45) 発行日 平成17年3月16日(2005.3.16)

(24) 登録日 平成16年12月17日(2004.12.17)

(51) Int. Cl.⁷

H01L 21/66

F I

H01L 21/66

J

請求項の数 35 (全 35 頁)

(21) 出願番号	特願2002-42398 (P2002-42398)	(73) 特許権者	301022703 本多エレクトロン株式会社 東京都中央区京橋二丁目14番1号
(22) 出願日	平成14年2月19日(2002.2.19)	(73) 特許権者	000221122 東芝セラミックス株式会社 東京都新宿区西新宿七丁目5番25号
(65) 公開番号	特開2003-243465 (P2003-243465A)	(74) 代理人	100093148 弁理士 丸岡 裕作
(43) 公開日	平成15年8月29日(2003.8.29)	(72) 発明者	林 義典 東京都中央区日本橋本町1丁目8番16号 本多エレクトロン株式会社内
審査請求日	平成14年2月19日(2002.2.19)	(72) 発明者	西風館 広幸 東京都中央区日本橋本町1丁目8番16号 本多エレクトロン株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ウェーハ用検査装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

周端縁に底部及び両側部を有して略U字状に切り欠かれたノッチがある円盤状のウェーハを検査するウェーハ用検査装置であって、該ウェーハを回転可能に支持する支持部と、該支持部に支持されて回転させられるウェーハの周端縁を連続的に撮像する周端縁撮像部と、上記ウェーハの周端縁を照明する周端縁照明部と、上記周端縁撮像部で撮像した撮像データを処理する制御部とを備えたウェーハ用検査装置において、

上記周端縁撮像部を、上記ウェーハの周端縁の厚さ方向の異なる部位を撮像する複数の撮像カメラを配置して構成し、

上記周端縁撮像部の撮像カメラを上記周端縁の厚さ方向に沿って略直線状に撮像するライ

10

ンセンサで構成し、
上記ノッチを撮像するノッチ撮像部を設け、上記ノッチを照明するノッチ照明部を設け、上記制御部に該ノッチ撮像部で撮像した撮像データを処理する機能を備え、上記ノッチ撮像部を、上記ノッチの厚さ方向の異なる部位を撮像するエリアセンサで構成した複数の撮像カメラを配置して構成したことを特徴とするウェーハ用検査装置。

【請求項2】

上記ウェーハの周端縁は、ウェーハの面に対して略直角な側面、該側面に対して傾斜して面取りされた上面及び下面を備えて構成され、上記周端縁撮像部において、上記側面、上面及び下面に対応し各面に対して撮像方向を略直角に対面させて夫々配置した側面用撮像カメラ、上面用撮像カメラ及び下面用撮像カメラを備え、該周端縁撮像部の各撮像カメラ

20

を、該各撮像カメラの撮像部位が上記ウエーハの周端縁の同じ位相位置を撮像し得るように配置したことを特徴とする請求項1記載のウエーハ用検査装置。

【請求項3】

上記周端縁照明部を、上記ウエーハの周端縁の厚さ方向に沿う所定の円弧に沿って照射面を形成し該円弧の中心に向けて収束するように照射光を放光する光ファイバの集合体を備えて構成するとともに、上記周端縁撮像部の各撮像カメラが該周端縁照明部からの照明光が反射した反射光の明視野範囲に位置するように配置したことを特徴とする請求項2記載のウエーハ用検査装置。

【請求項4】

上記制御部を、撮像データ処理部と、CRT等の表示部とを備えて構成し、上記撮像データ処理部を、上記周端縁撮像部の複数の撮像カメラで撮像したウエーハの周端縁をウエーハの角度位置の位相を合わせて上記表示部に同時表示する周端縁表示手段を設けて構成したことを特徴とする請求項1、2または3記載のウエーハ用検査装置。

10

【請求項5】

上記撮像データ処理部を、ウエーハの周端縁の画像データから基準にする基準輝度に対して所定以上の輝度差のあるエリアを欠陥部として認識する欠陥部認識手段と、該欠陥部認識手段が認識した欠陥部を上記表示部に座標表示する欠陥部座標表示手段とを備えて構成したことを特徴とする請求項4記載のウエーハ用検査装置。

【請求項6】

上記欠陥部座標表示手段を、ウエーハの周端縁の周方向に沿う角度座標を表示する角度座標表示機能と、ウエーハの周端縁の厚さ方向に沿う相対位置を表示する厚さ方向座標表示機能とを備えて構成したことを特徴とする請求項5記載のウエーハ用検査装置。

20

【請求項7】

上記撮像データ処理部を、上記欠陥部認識手段が認識した欠陥部の形状を認識する欠陥部形状認識手段と、該欠陥部形状認識手段が認識した形状を上記表示部に表示する欠陥部形状表示手段を備えて構成したことを特徴とする請求項5または6記載のウエーハ用検査装置。

【請求項8】

上記欠陥部形状認識手段を、予め定められたしきい値に基づいて点欠陥部、線欠陥部及び面欠陥部のいずれかに区分けして認識する機能を備えて構成したことを特徴とする請求項7記載のウエーハ用検査装置。

30

【請求項9】

上記周端縁撮像部の各撮像カメラの撮像面毎に、点欠陥部、線欠陥部及び面欠陥部の分布を所定の角度単位で算出する欠陥分布算出手段を備えたことを特徴とする請求項8記載のウエーハ用検査装置。

【請求項10】

上記周端縁撮像部の各撮像カメラの撮像面毎に、点欠陥部、線欠陥部及び面欠陥部の程度を所定の角度単位でランク付けする欠陥ランク付け手段を備えたことを特徴とする請求項9記載のウエーハ用検査装置。

【請求項11】

上記撮像データ処理部を、上記欠陥部認識手段が認識した欠陥部の面積を算出する欠陥部面積算出手段と、該欠陥部面積算出手段が算出した面積を上記表示部に表示する欠陥部面積表示手段と、上記欠陥部認識手段が認識した欠陥部が外接する外接矩形の大きさを算出する欠陥部外接矩形大きさ算出手段と、該欠陥部外接矩形大きさ算出手段が算出した大きさを上記表示部に表示する欠陥部外接矩形大きさ表示手段とを備えて構成したことを特徴とする請求項5、6、7、8、9または10記載のウエーハ用検査装置。

40

【請求項12】

上記撮像データ処理部を、上記欠陥部面積算出手段が算出した欠陥部の面積と、欠陥部外接矩形大きさ算出手段が算出した外接矩形の大きさとから欠陥部の密度を算出する欠陥部密度算出手段と、該欠陥部密度算出手段が算出した欠陥部の密度を上記表示部に表示する

50

欠陥部密度表示手段とを備えて構成したことを特徴とする請求項 1 1 記載のウエー八用検査装置。

【請求項 1 3】

上記撮像データ処理部を、上記欠陥部認識手段が認識した欠陥部の平均輝度を算出する欠陥部輝度算出手段と、該欠陥部輝度算出手段が算出した欠陥部の平均輝度を上記表示部に表示する欠陥部輝度表示手段とを備えて構成したことを特徴とする請求項 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 または 1 2 記載のウエー八用検査装置。

【請求項 1 4】

上記撮像データ処理部を、上記欠陥部認識手段が認識した欠陥部に基いて、当該ウエー八の良否を判定する良否判定手段と、該良否判定手段が判定した当該ウエー八の良否を上記表示部に表示するウエー八良否表示手段とを備えて構成したことを特徴とする請求項 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 2 または 1 3 記載のウエー八用検査装置。

10

【請求項 1 5】

上記ノッチがウエー八の面に対して略直角な側面、該側面に対して傾斜して面取りされた上面及び下面を備えて構成され、上記ノッチ撮像部の撮像カメラを、上記側面、上面及び下面に対応し各面に対して撮像方向を略直角に対面させて夫々配置したことを特徴とする請求項 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 2, 1 3 または 1 4 記載のウエー八用検査装置。

【請求項 1 6】

上記ノッチ撮像部において、上記ノッチの底部の側面に対応した底部側面撮像カメラ、該底部の上面に対応した底部上面撮像カメラ、該底部の下面に対応した底部下面撮像カメラ、上記ノッチの一方の側部の側面に対応した一方側部側面撮像カメラ、上記ノッチの他方の側部の側面に対応した他方側部側面撮像カメラを備えたことを特徴とする請求項 1 5 記載のウエー八用検査装置。

20

【請求項 1 7】

上記ノッチ照明部を、上記ノッチに向けて照射光を放光する発光ダイオードの集合体を備えて構成するとともに、上記ノッチ撮像部の各撮像カメラが該ノッチ照明部からの照明光が反射した反射光の明視野範囲に位置するように配置したことを特徴とする請求項 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 または 1 6 記載のウエー八用検査装置。

30

【請求項 1 8】

上記ノッチ照明部を、上記ノッチに向けて照射光を放光する発光ダイオードの集合体を備えて構成するとともに、上記ノッチ撮像部の各撮像カメラが該ノッチ照明部からの照明光が反射した反射光の明視野範囲に位置するように配置し、上記底部上面撮像カメラ及び底部下面撮像カメラに夫々設けられ該各撮像カメラの撮像面が中央に臨むドーム状の照射面を形成し上記ノッチに向けて照射光を放光するドーム照射体と、上記底部側面撮像カメラ、一方側部側面撮像カメラ及び他方側部側面撮像カメラの撮像面が臨むスリットを形成するように設けられた略平面状の照射面を一对有し上記ノッチに向けて照射光を放光する平面照射体とを備えて構成したことを特徴とする請求項 1 7 記載のウエー八用検査装置。

【請求項 1 9】

上記制御部を、撮像データ処理部と、CRT等の表示部とを備えて構成し、上記撮像データ処理部を、上記ノッチ撮像部の複数の撮像カメラで撮像したノッチの画像を上記表示部に同時表示するノッチ表示手段を設けて構成したことを特徴とする請求項 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7 または 1 8 記載のウエー八用検査装置。

40

【請求項 2 0】

上記撮像データ処理部を、上記表示部に表示される各撮像カメラに対応するノッチの画像の最適画像範囲を、基準位置を基準にして設定する画像範囲設定手段を備えて構成したことを特徴とする請求項 1 9 記載のウエー八用検査装置。

【請求項 2 1】

50

上記基準位置を、各撮像カメラに対応してノッチの表面に行列状の点を付した基準ウエー八を撮像し、該撮像画面の行列状の点に基づいて決定することを特徴とする請求項 20 記載のウエー八用検査装置。

【請求項 22】

上記撮像データ処理部を、ノッチの画像データから基準にする基準輝度に対して所定以上の輝度差のあるエリアを欠陥部として認識する欠陥部認識手段と、該欠陥部認識手段が認識した欠陥部を上記表示部に座標表示する欠陥部座標表示手段とを備えて構成したことを特徴とする請求項 19, 20 または 21 記載のウエー八用検査装置。

【請求項 23】

上記撮像データ処理部を、上記欠陥部認識手段が認識した欠陥部の形状を認識する欠陥部形状認識手段と、該欠陥部形状認識手段が認識した形状を上記表示部に表示する欠陥部形状表示手段を備えて構成したことを特徴とする請求項 22 記載のウエー八用検査装置。

10

【請求項 24】

上記欠陥部形状認識手段を、予め定められたしきい値に基づいて点欠陥部、線欠陥部及び面欠陥部のいずれかに区分けして認識する機能を備えて構成したことを特徴とする請求項 23 記載のウエー八用検査装置。

【請求項 25】

上記撮像データ処理部を、上記欠陥部認識手段が認識した欠陥部の面積を算出する欠陥部面積算出手段と、該欠陥部面積算出手段が算出した面積を上記表示部に表示する欠陥部面積表示手段と、上記欠陥部認識手段が認識した欠陥部が外接する外接矩形の大きさを算出する欠陥部外接矩形大きさ算出手段と、該欠陥部外接矩形大きさ算出手段が算出した大きさを上記表示部に表示する欠陥部外接矩形大きさ表示手段とを備えて構成したことを特徴とする請求項 22, 23 または 24 記載のウエー八用検査装置。

20

【請求項 26】

上記撮像データ処理部を、上記欠陥部面積算出手段が算出した欠陥部の面積と上記欠陥部外接矩形大きさ算出手段が算出した外接矩形の大きさから欠陥部の密度を算出する欠陥部密度算出手段と、該欠陥部密度算出手段が算出した欠陥部の密度を上記表示部に表示する欠陥部密度表示手段とを備えて構成したことを特徴とする請求項 25 記載のウエー八用検査装置。

【請求項 27】

上記撮像データ処理部を、上記欠陥部認識手段が認識した欠陥部の平均輝度を算出する欠陥部輝度算出手段と、該欠陥部輝度算出手段が算出した欠陥部の平均輝度を上記表示部に表示する欠陥部輝度表示手段とを備えて構成したことを特徴とする請求項 22, 23, 24, 25 または 26 記載のウエー八用検査装置。

30

【請求項 28】

上記撮像データ処理部を、上記欠陥部認識手段が認識した欠陥部に基づいて、当該ウエー八の良否を判定するウエー八良否判定手段と、該ウエー八良否判定手段が判定した当該ウエー八の良否を上記表示部に表示するウエー八良否表示手段とを備えて構成したことを特徴とする請求項 22, 23, 24, 25, 26 または 27 記載のウエー八用検査装置。

【請求項 29】

上記支持部を、中心軸を回転中心として回転可能に設けられ該中心軸を中心とする円周上に上記ウエー八の周端縁を支承する複数の支承フィンガを備えた支承盤と、該支承盤を回転させる駆動部とを備えて構成したことを特徴とする請求項 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 または 28 記載のウエー八用検査装置。

40

【請求項 30】

上記支承フィンガを、上記中心軸側に向けて下に傾斜する上記ウエー八の周端縁を支承する支承面を備えて構成したことを特徴とする請求項 29 記載のウエー八用検査装置。

【請求項 31】

上記支持部を、上記支承盤の支承フィンガに支承されたウエー八の支承位置を可変にする

50

支承位置可変機構を備えて構成したことを特徴とする請求項 29 または 30 記載のウエー八用検査装置。

【請求項 32】

上記支承位置可変機構を、上記支承盤と同軸の中心軸を中心に相対回転可能に設けられ該中心軸を中心とする円周上に上記ウエー八の周端縁を担持可能な複数の担持フィンガを備えるとともに該担持フィンガを上記支承盤の支承フィンガより上位の位置であって該ウエー八を担持して持ち上げる担持位置及び該支承フィンガより下位の位置であって該ウエー八を上記支承フィンガに受け渡す受渡位置の 2 位置に移動可能な担持盤と、該担持盤を上記担持位置及び受渡位置の 2 位置に移動させる移動機構とを備えて構成したことを特徴とする請求項 31 記載のウエー八用検査装置。

10

【請求項 33】

ウエー八の貯留部から検査対象のウエー八を搬送して上記支持部の支承盤の支承フィンガに該ウエー八を芯出しして支承させるウエー八搬送部を備えたことを特徴とする請求項 29, 30, 31 または 32 記載のウエー八用検査装置。

【請求項 34】

上記ウエー八搬送部を、該ウエー八の周端縁に係合する係合部を備えるとともに該係合部を係合させて該ウエー八を該ウエー八の面方向に挾持して把持する把持位置及び該把持を解除する把持解除位置の 2 位置に相対移動可能な一对の把持ハンドを備えて構成し、上記係合部に上記把持位置で該ウエー八に弾接する弾接体を設けたことを特徴とする請求項 33 記載のウエー八用検査装置。

20

【請求項 35】

上記支持部に支持されて回転させられるウエー八の直径を計測する直径計測部を設けたことを特徴とする請求項 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 または 34 記載のウエー八用検査装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、円盤状のウエー八の周端縁を撮像し、この撮像データに基づいてウエー八の検査を非破壊で行なうことができるようにしたウエー八用検査装置に関する。

30

【0002】

【従来の技術】

従来、この種のウエー八用検査装置としては、例えば、特開平 8 - 136462 号公報に掲載されたものが知られている。

このウエー八用検査装置は、図 34 に示すように、円盤状のウエー八 W を回転可能に支持する支持部 1 と、支持部 1 に支持されて回転させられるウエー八 W の周端縁 S を連続的に撮像する撮像カメラ 2 と、撮像カメラ 2 で撮像した撮像画像を表示する CRT 等のモニタ（図示せず）とを備えて構成されている。

撮像カメラ 2 は、ウエー八 W に対して前後左右に移動可能に設けられているとともにウエー八 W の厚さ方向に回動可能に設けられており、これらの移動により撮像カメラの作動距離が調整される。

40

そして、ウエー八 W を回転させ撮像カメラ 2 を前後左右あるいは厚さ方向に回動させてウエー八 W の周端縁 S をモニタに表示し、ウエー八 W の周端縁 S にある欠陥の有無を観察するようにしている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、上述した従来のウエー八用検査装置にあつては、ウエー八 W の周端縁 S の内、撮像カメラ 2 の撮像方向に直角に対面する部位の画像は明瞭であるが、撮像カメラ 2 の撮像方向に斜めになってしまう部位の画像は不鮮明になり易く、そのため、欠陥の抽出精度に劣っているという問題があつた。

50

その理由は、例えば、図34に示すように、ウエーハWの周端縁Sが側面SS及び側面SSに対して傾斜して面取りされた上面SA、下面SBを有している場合には、撮像カメラ2をウエーハWの厚さ方向に回動させてその撮像方向を、例えば、側面SSに直角に対面させて合わせると、上面SA及び下面SBが撮像カメラ2の撮像方向に斜めになって撮像されることになるので、画像が不鮮明になって撮像精度が悪くなるからである。

【0004】

また、ウエーハWの側面SS、上面SA及び下面SBを夫々明瞭に撮像しようとする、各面に合わせてその都度撮像カメラ2の位置を移動させて各面に撮像カメラ2の撮像方向を直角に対面させる調整を行わなければならないので、操作が煩雑になるという問題もあった。

10

更に、モニタでは、側面SS、上面SA及び下面SBを明瞭にして同時に見ることはできないという問題もあった。

【0005】

本発明は上記の問題点を鑑みてなされたもので、ウエーハの周端縁が面取りされていても、撮像カメラの位置を逐一移動させることなく、厚さ方向全部を明瞭にしかも同時に撮像できるようにして、操作性を向上させるとともに、撮像精度を向上させ、欠陥の抽出精度の向上を図ったウエーハ用検査装置を提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】

このような目的を達成するため、本発明のウエーハ用検査装置は、円盤状のウエーハを回転可能に支持する支持部と、該支持部に支持されて回転させられるウエーハの周端縁を連続的に撮像する周端縁撮像部と、該周端縁撮像部で撮像した撮像データを処理する制御部とを備えたウエーハ用検査装置において、上記周端縁撮像部を、上記ウエーハの周端縁の厚さ方向の異なる部位を撮像する複数の撮像カメラを配置して構成している。

20

これにより、ウエーハの検査を行なうときは、ウエーハを支持部に支持して回転させ、この状態で、周端縁撮像部で周端縁の画像を取込む。この場合、周端縁撮像部は、ウエーハの周端縁の厚さ方向の異なる部位を撮像する複数の撮像カメラを備えているので、ウエーハの周端縁が面取りされていても、撮像カメラの位置を逐一移動させることなく、厚さ方向全部を明瞭にしかも同時に撮像でき、操作性が向上させられるとともに、撮像精度が向上させられる。取り込まれた撮像データは制御部に送出されて処理される。

30

【0007】

そして、必要に応じ、上記撮像カメラを上記周端縁の厚さ方向に沿って略直線状に撮像するラインセンサで構成している。周端縁を狭い幅で撮像してこれを連続させるので、解像度が良く、撮像精度が向上させられる。

また、必要に応じ、上記ウエーハの周端縁がウエーハの面に対して略直角な側面、該側面に対して傾斜して面取りされた上面及び下面を備えて構成された場合、上記側面、上面及び下面に対応し各面に対して撮像方向を略直角に対面させて夫々配置した側面用撮像カメラ、上面用撮像カメラ及び下面用撮像カメラを備えた構成としている。ウエーハの周端縁の各面を明瞭にしかも同時に撮像でき、操作性が向上させられるとともに、撮像精度が向上させられる。

40

【0008】

更に、必要に応じ、上記各撮像カメラを、該各撮像カメラの撮像部位が上記ウエーハの周端縁の同じ位相位置を撮像し得るように配置した構成としている。撮像カメラを集約できるので、装置がコンパクトになる。

この場合、必要に応じ、上記ウエーハの周端縁を照明する周端縁照明部を設け、該周端縁照明部を、上記ウエーハの周端縁の厚さ方向に沿う所定の円弧に沿って照射面を形成し該円弧の中心に向けて収束するように照射光を放光する光ファイバの集合体を備えて構成するとともに、上記各撮像カメラが該周端縁照明部からの照明光が反射した反射光の明視野範囲に位置するように配置した構成としている。

これにより、周端縁を照明する周端縁照明部は、ウエーハの周端縁の厚さ方向に沿う所定

50

の円弧に沿って照射面を形成し円弧の中心に向けて収束するように照射光を放光し、各撮像カメラは、周端縁照明部からの照明光が反射した反射光の明視野範囲に位置するように配置され、即ち、各撮像カメラは、C型の周端縁照明部からの照明を正反射で受けるよう配置されているので、周端縁の各面を明瞭に撮像でき、特に、欠陥を良く撮像でき、この点でも撮像精度が向上させられる。

【0009】

また、必要に応じ、上記制御部を、撮像データ処理部と、CRT等の表示部とを備えて構成し、上記撮像データ処理部を、上記周端縁撮像部の複数の撮像カメラで撮像したウエーハの周端縁をウエーハの角度位置の位相を合わせて上記表示部に同時表示する周端縁表示手段を設けて構成している。

10

これにより、周端面の面の状況、特に欠陥部の状況が視認できる。この場合、複数の撮像カメラでウエーハの周端縁の厚さ方向の異なる部位を撮像しているため、ウエーハの周端縁が面取りされていても各面を明瞭にしかも各面同時に視認することができ、それだけ、検査精度が向上させられる。

更に、必要に応じ、上記撮像データ処理部を、上記周端縁表示手段によって表示されたウエーハの周端縁の画像をウエーハの周端縁の周方向に沿ってスクロールするスクロール手段を設けて構成している。画像をスクロールすることで、全周に亘って良く視認することができ、それだけ、検査精度が向上させられる。

【0010】

更にまた、必要に応じ、上記撮像データ処理部を、ウエーハの周端縁の画像データから基準にする基準輝度に対して所定以上の輝度差のあるエリアを欠陥部として認識する欠陥部認識手段と、該欠陥部認識手段が認識した欠陥部を上記表示部に座標表示する欠陥部座標表示手段とを備えて構成している。欠陥部の位置を特定できるので、それだけ、検査精度が向上させられる。

20

この場合、必要に応じ、上記欠陥部座標表示手段を、ウエーハの周端縁の周方向に沿う角度座標を表示する角度座標表示機能と、ウエーハの周端縁の厚さ方向に沿う相対位置を表示する厚さ方向座標表示機能とを備えて構成している。表示が確実になる。

【0011】

また、必要に応じ、上記撮像データ処理部を、上記欠陥部認識手段が認識した欠陥部の形状を認識する欠陥部形状認識手段と、該欠陥部形状認識手段が認識した形状を上記表示部に表示する欠陥部形状表示手段を備えて構成している。欠陥の形状が分かるので、それだけ、検査精度が向上させられる。

30

この場合、上記欠陥部形状認識手段を、予め定められたしきい値に基づいて点欠陥部、線欠陥部及び面欠陥部のいずれかに区分けして認識する機能を備えて構成したことが有効である。欠陥の種類が分類されるので、認識が容易になる。

また、この場合、必要に応じ、上記各撮像カメラの撮像面毎に、点欠陥部、線欠陥部及び面欠陥部の分布を所定の角度単位で算出する欠陥分布算出手段を備えた構成としている。周端縁の欠陥の分布状態が分かるので、欠陥の発生原因究明等に利用でき、それだけ、検査精度が向上させられる。

更に、この場合、必要に応じ、上記各撮像カメラの撮像面毎に、点欠陥部、線欠陥部及び面欠陥部の程度を所定の角度単位でランク付けする欠陥ランク付け手段を備えた構成としている。周端縁の欠陥の程度が分かるので、欠陥の発生原因究明等に利用でき、それだけ、検査精度が向上させられる。

40

【0012】

更にまた、必要に応じ、上記撮像データ処理部を、上記欠陥部認識手段が認識した欠陥部の面積を算出する欠陥部面積算出手段と、該欠陥部面積算出手段が算出した面積を上記表示部に表示する欠陥部面積表示手段と、上記欠陥部認識手段が認識した欠陥部が外接する外接矩形の大きさを算出する欠陥部外接矩形大きさ算出手段と、該欠陥部外接矩形大きさ算出手段が算出した大きさを上記表示部に表示する欠陥部外接矩形大きさ表示手段とを備えて構成している。欠陥の大きさを認識でき、それだけ、検査精度が向上させられる。

50

また、必要に応じ、上記撮像データ処理部を、上記欠陥部面積算出手段が算出した欠陥部の面積と、欠陥部外接矩形大きさ算出手段が算出した外接矩形の大きさとから欠陥部の密度を算出する欠陥部密度算出手段と、該欠陥部密度算出手段が算出した欠陥部の密度を上記表示部に表示する欠陥部密度表示手段とを備えて構成している。欠陥の広がりを認識でき、それだけ、検査精度が向上させられる。

【0013】

更に、必要に応じ、上記撮像データ処理部を、上記欠陥部認識手段が認識した欠陥部の平均輝度を算出する欠陥部輝度算出手段と、該欠陥部輝度算出手段が算出した欠陥部の平均輝度を上記表示部に表示する欠陥部輝度表示手段とを備えて構成している。欠陥部の輝度は欠陥の深さに対応することから、欠陥の奥行きを認識でき、それだけ、検査精度が向上

10

させられる。更にまた、上記撮像データ処理部を、上記欠陥部認識手段が認識した欠陥部に基いて、当該ウエーハの良否を判定する良否判定手段と、該良否判定手段が判定した当該ウエーハの良否を上記表示部に表示するウエーハ良否表示手段とを備えて構成している。ウエーハの良否を自動的に判定できるので、検査が容易になる。

【0014】

そして、本発明において対象とするウエーハは、その周端縁に底部及び両側部を有して略U字状に切り欠かれたノッチがあるウエーハであり、本発明は、該ノッチを撮像するノッチ撮像部を設け、上記制御部に該ノッチ撮像部で撮像した撮像データを処理する機能を備えて構成し、上記ノッチ撮像部を、上記ノッチの厚さ方向の異なる部位を撮像する複数の

20

撮像カメラを配置した構成としている。これにより、ウエーハを支持部に支持して、ノッチ撮像部でノッチの画像を取込む。ノッチ撮像部は、ノッチの厚さ方向の異なる部位を撮像する複数の撮像カメラを備えているので、ノッチが面取りされていても、撮像カメラの位置を逐一移動させることなく、厚さ方向全部を明瞭にしかも同時に撮像でき、操作性が向上させられるとともに、撮像精度が向上させられる。取り込まれた撮像データは制御部に送出されて処理される。

【0015】

そして、必要に応じ、上記撮像カメラを面状に撮像するエリアセンサで構成している。ウエーハを回転させることなく、一時に撮像できる。

そしてまた、必要に応じ、上記ノッチがウエーハの面に対して略直角な側面、該側面に対して傾斜して面取りされた上面及び下面を備えて構成された場合、上記撮像カメラを、上記側面、上面及び下面に対応し各面に対して撮像方向を略直角に対面させて夫々配置した構成としている。ノッチの各面を明瞭にしかも同時に撮像でき、操作性が向上させられるとともに、撮像精度が向上させられる。

30

この場合、必要に応じ、上記ノッチの底部の側面に対応した底部側面撮像カメラ、該底部の上面に対応した底部上面撮像カメラ、該底部の下面に対応した底部下面撮像カメラ、上記ノッチの一方の側部の側面に対応した一方側部側面撮像カメラ、上記ノッチの他方の側部の側面に対応した他方側部側面撮像カメラを備えた構成としている。ノッチの各面を明瞭にしかも同時に撮像でき、操作性が向上させられるとともに、撮像精度が向上させられる。

40

【0016】

また、必要に応じ、上記ノッチを照明するノッチ照明部を設け、該ノッチ照明部を、上記ノッチに向けて照射光を放光する発光ダイオードの集合体を備えて構成するとともに、上記各撮像カメラが該ノッチ照明部からの照明光が反射した反射光の明視野範囲に位置するように配置した構成としている。ノッチ照明部からの照明光が反射した反射光の明視野範囲に位置するように配置されているので、ノッチの各面を明瞭に撮像でき、特に、欠陥を良く撮像でき、この点でも撮像精度が向上させられる。

更に、必要に応じ、上記ノッチを照明するノッチ照明部を設け、該ノッチ照明部を、上記ノッチに向けて照射光を放光する発光ダイオードの集合体を備えて構成するとともに、上記各撮像カメラが該ノッチ照明部からの照明光が反射した反射光の明視野範囲に位置する

50

ように配置し、上記底部上面撮像カメラ及び底部下面撮像カメラに夫々設けられ該各撮像カメラの撮像面が中央に臨むドーム状の照射面を形成し上記ノッチに向けて照射光を放光するドーム照射体と、上記底部側面撮像カメラ、一方側部側面撮像カメラ及び他方側部側面撮像カメラの撮像面が臨むスリットを形成するように設けられた略平面状の照射面を一对有し上記ノッチに向けて照射光を放光する平面照射体とを備えて構成している。これにより、ノッチを照明するノッチ照明部が、ドーム照射体及び平面照射体を備え、ノッチを良く照明するとともに、各撮像カメラは、ノッチ照明部からの照明光が反射した反射光の明視野範囲に位置するように配置されているので、ノッチの各面を明瞭に撮像でき、特に、欠陥を良く撮像でき、この点でも撮像精度が向上させられる。

【 0 0 1 7 】

そして、必要に応じ、上記制御部を、撮像データ処理部と、C R T等の表示部とを備えて構成し、上記撮像データ処理部を、上記ノッチ撮像部の複数の撮像カメラで撮像したノッチの画像を上記表示部に同時表示するノッチ表示手段を設けて構成している。

これにより、ノッチの面の状況、特に欠陥部の状況が視認できる。この場合、複数の撮像カメラでノッチの厚さ方向の異なる部位を撮像しているため、ノッチが面取りされていても各面を明瞭にしかも各面同時に視認することができ、それだけ、検査精度が向上させられる。

【 0 0 1 8 】

また、必要に応じ、上記撮像データ処理部を、上記表示部に表示される各撮像カメラに対応するノッチの画像の最適画像範囲を、基準位置を基準にして設定する画像範囲設定手段を備えて構成している。これにより、画像データのデータ処理が、この範囲設定された画像に基づいて行なわれる。そのため、より精度の良い欠陥認識を行なうことができるようになる。

この場合、必要に応じ、上記基準位置を、各撮像カメラに対応してノッチの表面に行列状の点を付した基準ウエー八を撮像し、該撮像画面の行列状の点に基づいて決定する構成としている。これにより、ノッチ撮像部で基準ウエー八のノッチの画像を取込む。そして、ノッチ画像の焦点の合っている（ピントの合っている）箇所を、基準ウエー八に付した行列状の点を目視により見て、この点の位置に合わせて、最適範囲設定を行なう。そのため、行列状の点で細かく範囲合わせを行なうことができ、範囲設定が確実に行なわれる。

【 0 0 1 9 】

また、必要に応じ、上記撮像データ処理部を、ノッチの画像データから基準にする基準輝度に対して所定以上の輝度差のあるエリアを欠陥部として認識する欠陥部認識手段と、該欠陥部認識手段が認識した欠陥部を上記表示部に座標表示する欠陥部座標表示手段とを備えて構成している。欠陥部の位置を特定できるので、それだけ、検査精度が向上させられる。

このノッチの画像処理においても、上記周端部と同様に上記撮像データ処理部を構成することが望ましい。

【 0 0 2 0 】

即ち、必要に応じ、上記撮像データ処理部を、上記欠陥部認識手段が認識した欠陥部の形状を認識する欠陥部形状認識手段と、該欠陥部形状認識手段が認識した形状を上記表示部に表示する欠陥部形状表示手段を備えて構成している。欠陥の形状が分かるので、それだけ、検査精度が向上させられる。

この場合、上記欠陥部形状認識手段を、予め定められたしきい値に基づいて点欠陥部、線欠陥部及び面欠陥部のいずれかに区分けして認識する機能を備えて構成したことが有効である。欠陥の種類が分類されるので、認識が容易になる。

【 0 0 2 1 】

更にまた、必要に応じ、上記撮像データ処理部を、上記欠陥部認識手段が認識した欠陥部の面積を算出する欠陥部面積算出手段と、該欠陥部面積算出手段が算出した面積を上記表示部に表示する欠陥部面積表示手段と、上記欠陥部認識手段が認識した欠陥部が外接する外接矩形の大きさを算出する欠陥部外接矩形大きさ算出手段と、該欠陥部外接矩形大きさ

10

20

30

40

50

算出手段が算出した大きさを上記表示部に表示する欠陥部外接矩形大きさ表示手段とを備えて構成している。欠陥の大きさを認識でき、それだけ、検査精度が向上させられる。また、必要に応じ、上記撮像データ処理部を、上記欠陥部面積算出手段が算出した欠陥部の面積と、欠陥部外接矩形大きさ算出手段が算出した外接矩形の大きさとから欠陥部の密度を算出する欠陥部密度算出手段と、該欠陥部密度算出手段が算出した欠陥部の密度を上記表示部に表示する欠陥部密度表示手段とを備えて構成している。欠陥の広がりを認識でき、それだけ、検査精度が向上させられる。

【0022】

更に、必要に応じ、上記撮像データ処理部を、上記欠陥部認識手段が認識した欠陥部の平均輝度を算出する欠陥部輝度算出手段と、該欠陥部輝度算出手段が算出した欠陥部の平均輝度を上記表示部に表示する欠陥部輝度表示手段とを備えて構成している。欠陥部の輝度は欠陥の深さに対応することから、欠陥の奥行きを認識でき、それだけ、検査精度が向上させられる。

10

更にまた、上記撮像データ処理部を、上記欠陥部認識手段が認識した欠陥部に基づいて、当該ウエーハの良否を判定する良否判定手段と、該良否判定手段が判定した当該ウエーハの良否を上記表示部に表示するウエーハ良否表示手段とを備えて構成している。ウエーハの良否を自動的に判定できるので、検査が容易になる。

【0023】

そして、必要に応じ、上記支持部を、中心軸を回転中心として回転可能に設けられ該中心軸を中心とする円周上に上記ウエーハの周端縁を支承する複数の支承フィンガを備えた支承盤と、該支承盤を回転させる駆動部とを備えて構成している。ウエーハが支承フィンガに支承されるので、ウエーハの面を傷つける等悪影響を及ぼす事態が防止される。

20

この場合、必要に応じ、上記支承フィンガを、上記中心軸側に向けて下に傾斜する上記ウエーハの周端縁を支承する支承面を備えて構成したことが有効である。ウエーハの周端縁を支承面で線支持するようになるので、より一層ウエーハの面を傷つける等悪影響を及ぼす事態が防止される。

【0024】

また、必要に応じ、上記支持部を、上記支承盤の支承フィンガに支承されたウエーハの支承位置を可変にする支承位置可変機構を備えて構成している。支承位置を変えるので、支承フィンガのある撮像できないウエーハの部位を露出させて撮像できるようにすることができる。

30

この場合、必要に応じ、上記支承位置可変機構を、上記支承盤と同軸の中心軸を中心に相対回転可能に設けられ該中心軸を中心とする円周上に上記ウエーハの周端縁を担持可能な複数の担持フィンガを備えたとともに該担持フィンガを上記支承盤の支承フィンガより上位の位置であって該ウエーハを担持して持ち上げる担持位置及び該支承フィンガより下位の位置であって該ウエーハを上記支承フィンガに受け渡す受渡位置の2位置に移動可能な担持盤と、該担持盤を上記担持位置及び受渡位置の2位置に移動させる移動機構とを備えて構成している。

これにより、ウエーハの支承位置を変える際は、受渡位置にある担持盤を担持位置に移動させ、支承盤に支承されていたウエーハを担持盤の担持フィンガに担持して持ち上げ、この持ち上げられている間に、支承盤を回転させて支承盤の支承フィンガが別の角度位相位置に位置させる。それから、担持盤を受渡位置に位置させてウエーハを支承フィンガに受け渡す。この場合、支承位置を変えるので、先に撮像できなかった部位を露出させて撮像できるようにすることができる。また、ウエーハを担持盤の担持フィンガに担持させて持ち上げるので、ウエーハに傷をつける等の悪影響を及ぼす事態が防止される。

40

【0025】

更に、必要に応じ、ウエーハの貯留部から検査対象のウエーハを搬送して上記支持部の支承盤の支承フィンガに該ウエーハを芯出しして支承させるウエーハ搬送部を備えた構成としている。これにより、支承盤の支承フィンガに対してウエーハが芯出しされて支承されるので、支承盤に対するウエーハの位置決め精度が高くなり、その後の検査精度が向上さ

50

せられる。

この場合、必要に応じ、上記ウエー八搬送部を、該ウエー八の周端縁に係合する係合部を備えるとともに該係合部を係合させて該ウエー八を該ウエー八の面方向に挾持して把持する把持位置及び該把持を解除する把持解除位置の2位置に相対移動可能な一对の把持ハンドを備えて構成し、上記係合部に上記把持位置で該ウエー八に弾接する弾接体を設けた構成としている。把持ハンドは把持位置において、その係合部をウエー八の周端縁に係合させ、ウエー八をウエー八の面方向に挾持して把持する。この把持により、係合部の弾接体がウエー八に弾接されるので、ウエー八が中央に求心させられ、支持部の支承盤の支承フィンガに対してウエー八が容易に芯出しされる。

そして、必要に応じ、上記支持部に支持されて回転させられるウエー八の直径を計測する直径計測部を設けた構成としている。ウエー八の直径検査が、欠陥検査と同時に行われる。

10

【0026】

【発明の実施の形態】

以下、添付図面に基づいて、本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置について説明する。

図1乃至図11に示す実施の形態に係るウエー八用検査装置が検査するウエー八Wは、図12及び図13に示すように、円盤状に形成され、その周端縁Sが面取り形成されている。ウエー八Wの周端縁Sは、ウエー八Wの面に対して略直角な側面SS、この側面SSに対して傾斜して面取りされた上面SA及び下面SBを備えて構成されている。また、ウエー八Wの周端縁Sの所定部位には、底部Nt、一方の側部Na及び他方の側部Nbの両側部を有して略U字状に切り欠かれたノッチNが形成されている。このノッチNにおいても、ウエー八Wの面に対して略直角な側面SS、側面SSに対して傾斜して面取りされた上面SA及び下面SBを備えて構成されている。ウエー八Wの直径は例えば、300mmに設定されている。

20

【0027】

実施の形態に係るウエー八用検査装置の基本的構成は、円盤状のウエー八Wを回転可能に支持する支持部10と、支持部10に支持されて回転させられるウエー八Wの周端縁Sを連続的に撮像する周端縁撮像部40と、ノッチNを撮像するノッチ撮像部50と、周端縁撮像部40で撮像した撮像データ及びノッチ撮像部50で撮像した撮像データを処理する制御部70とを備えて構成されている。

30

【0028】

支持部10は、図1乃至図9及び図33に示すように、主には、図7乃至図9に示すように、基台11と、基台11に中心軸13aを回転中心として回転可能に設けられこの中心軸13aを中心とする円周上にウエー八Wの周端縁Sを支承する複数の支承フィンガ12を備えた支承盤13と、この支承盤13を回転させるモータ14及びベルト伝導機構15からなる駆動部16とを備えて構成されている。

支承盤13の支承フィンガ12は、等角度関係で3つ設けられており、図9に示すように、中心軸13a側に向けて下に傾斜するウエー八Wの周端縁Sを支承する支承面17を備えて構成されている。

40

【0029】

また、支持部10は、支承盤13の支承フィンガ12に支承されたウエー八Wの支承位置を可変にする支承位置可変機構20を備えて構成されている。

支承位置可変機構20は、図1乃至図9及び図33に示すように、主には、図7乃至図9に示すように、支承盤13と中心軸13aを中心に相対回転可能に設けられ支承盤13の中心軸13aを中心とする円周上にウエー八Wの周端縁Sを担持可能な複数(実施の形態では3つ)の担持フィンガ22を備えるとともに担持フィンガ22を支承盤13の支承フィンガ12より上位の位置であってウエー八Wを担持して持ち上げる担持位置Xa(図33中(b)(c))及び支承フィンガ12より下位の位置であってウエー八Wを支承フィンガ12に受け渡す受渡位置Xb(図33中(a)(d))の2位置に移動可能な担持盤

50

23と、担持盤23を担持位置Xa及び受渡位置Xbの2位置に移動させるエアシリンダ装置24を有した移動機構25と備えて構成されている。そして、担持位置Xa(図33中(b))に位置している間に、支承盤13を回転させて支承フィンガ12が別の角度位相位置に位置するように回転せしめ(図33中(c))、この位置で再び支承盤13の支承フィンガ12に支承せしめる(図33(d))ものである。担持フィンガ22も、中心軸13a側に向けて下に傾斜するウエーハWの周端縁Sを支承する支承面26を備えて構成されている。

【0030】

また、実施の形態においては、ウエーハ搬送部30を備えている。ウエーハ搬送部30は、図1、図10及び図11に示すように、ウエーハWの貯留部31から検査対象のウエーハWを搬送して支持部10の支承盤13の支承フィンガ12にウエーハWを芯出し(センタ出し)して支承させるものである。詳しくは、ウエーハ搬送部30は、ウエーハWの周端縁Sに係合する夫々2つずつの係合部32を備えるとともにこの係合部32に係合させてウエーハWをウエーハWの面方向に挟持して把持する把持位置Ya及び該把持を解除する把持解除位置Ybの2位置に相対移動可能な一对の把持ハンド33、33を備えて構成されている。37は把持ハンド33を駆動するエアシリンダ装置である。係合部32は、図11に示すように、ウエーハWの周端縁部を支持する支持面部34と、ウエーハWの周端縁Sの外側への移動を規制する規制面部35と、把持位置YaでウエーハWの周端縁Sに弾接する弾接体36とを備えて構成されている。弾接体36は、ウエーハWの周端縁Sに当接する当接部材36aと、一端側に当接部材36aが取付けられ他端側が規制面部35に固定され、この当接部材36aをウエーハWに弾接させる板バネ36bとから構成されている。

【0031】

周端縁撮像部40は、図1乃至図6、図14乃至図16に示すように、ウエーハWの周端縁Sの厚さ方向の異なる部位を撮像する複数の撮像カメラ41を配置して構成されている。この撮像カメラ41は、周端縁Sの厚さ方向に沿って略直線状に撮像するラインセンサで構成されている。ここで、厚さ方向とは、ウエーハWの円周方向に直交する円周方向に略沿う方向である。ラインセンサは、例えば、1024ピクセルで約3300 μ m幅の画像を取り込む。

詳しくは、周端縁撮像部40は、ウエーハWの周端縁Sの側面SS、上面SA及び下面SBに対応し各面に対して撮像方向を略直角に対面させて夫々配置した側面用撮像カメラ41(SS)、上面用撮像カメラ41(SA)及び下面用撮像カメラ41(SB)を備えている。各撮像カメラ41は、各撮像カメラ41の撮像部位がウエーハWの周端縁Sの同じ回転位相位置を撮像し得るように配置されて取付台44に取付けられている。撮像カメラ41が集約されているので、装置をコンパクトにすることができる。

【0032】

また、実施の形態では、図1乃至図6、図15及び図16に示すように、ウエーハWの周端縁Sを照明する周端縁照明部42が設けられている。この周端縁照明部42は、ウエーハWの周端縁Sの厚さ方向に沿う所定の円弧に沿って照射面を形成し該円弧の中心に向けて収束するように照射光を放光する光ファイバ43の集合体を備えてC型形状に構成されている。そして、各撮像カメラ41は、周端縁照明部42からの照明光が反射した反射光の明視野範囲に位置するように取付台44に取付けられて配置されている。即ち、ラインセンサからなる各撮像カメラ41は、C型の周端縁照明部42からの照明を正反射で受けるよう配置されている。

より詳しくは、例えば、上面用撮像カメラ41(SA)及び下面用撮像カメラ41(SB)は、ウエーハWの上下面が水平方向に対し20°~30°の角度を持つことを考慮して、鉛直方向より25°の向きに取り付けてある。

このような光学系で撮像が行なわれるので、図16に示すように、ピット、あるいは突起など、正反射光が撮像カメラ41に入射されない部分は暗くなり、後述の画像処理で欠陥として抽出される。

10

20

30

40

50

【 0 0 3 3 】

ノッチ撮像部 5 0 は、図 1 乃至図 6 , 図 1 4 に示すように、ノッチ N の厚さ方向の異なる部位を撮像する複数の撮像カメラ 5 1 を配置して構成されている。この撮像カメラ 5 1 は、面状に撮像するエリアセンサで構成されている。

詳しくは、ノッチ撮像部 5 0 の撮像カメラ 5 1 は、ノッチ N の側面 S S , 上面 S A 及び下面 S B に対応し各面に対して撮像方向を略直角に対面させて夫々配置されている。即ち、ノッチ撮像部 5 0 は、ノッチ N の底部 N t の側面 S S に対応した底部側面撮像カメラ 5 1 (S S (N t)) , 底部 N t の上面 S A に対応した底部上面撮像カメラ 5 1 (S A (N t)) , 底部 N t の下面 S B に対応した底部下面撮像カメラ 5 1 (S B (N t)) , ノッチ N の一方の側部 N a の側面 S S に対応した一方側部側面撮像カメラ 5 1 (S S (N a)) , ノッチ N の他方の側部 N b の側面 S S に対応した他方側部側面撮像カメラ 5 1 (S S (N b)) を備えている。

10

【 0 0 3 4 】

また、実施の形態では、ノッチ N を照明するノッチ照明部 5 2 が設けられている。このノッチ照明部 5 2 は、ノッチ N に向けて照射光を放光する発光ダイオードの集合体を備えて構成されており、各撮像カメラ 5 1 は、ノッチ照明部 5 2 からの照明光が反射した反射光の明視野範囲に位置するように配置されて取付台 5 3 に取付けられている。図 2 に示すように、ノッチ照明部 5 2 は、底部上面撮像カメラ 5 1 (S A (N t)) 及び底部下面撮像カメラ 5 1 (S B (N t)) に夫々設けられ各撮像カメラ 5 1 の撮像面が中央に臨むドーム状の照射面を形成しノッチ N に向けて照射光を放光するドーム照射体 5 4 と、底部側面撮像カメラ 5 1 (S S (N t)) , 一方側部側面撮像カメラ 5 1 (S S (N a)) 及び他方側部側面撮像カメラ 5 1 (S S (N b)) の撮像面が臨むスリット 5 5 を形成するように設けられた略平面状の照射面を一对有し上記ノッチ N に向けて照射光を放光する平面照射体 5 6 とを備えて構成されている。

20

即ち、ノッチ N を撮像する光学系は、拡散照明かつエリアカメラを使用しているため、通常の写真撮影と同様の光学系となる。

【 0 0 3 5 】

更に、実施の形態では、ウエーハ W の直径を計測する直径測定部 6 0 が設けられている。直径測定部 6 0 は、ウエーハ W の周端縁 S の位置を検知する一对の光センサ 6 1 を 1 8 0 ° 位相をずらせて相対向して設け、検知した周端縁 S の位置から直径を計測するものである。詳しくは、図 2 9 に示すように、測定点はノッチ N の位置から約 8 ° 回転したところから測定を開始し、1 5 ° 単位で測定をする。そして、例えば、ウエーハ W の直径は m m 単位で 7 桁の固定少数点値で測定する。

30

【 0 0 3 6 】

次に、制御部 7 0 について説明する。図 1 に示すように、制御部 7 0 は、撮像データ処理部 7 1 と、C R T 等の表示部 7 2 とを備えて構成されている。

撮像データ処理部 7 1 は、図 1 7 に示すように、周端縁撮像部 4 0 の複数の撮像カメラ 4 1 で撮像したウエーハ W の周端縁 S をウエーハ W の角度位置の位相を合わせて表示部 7 2 に同時表示する周端縁表示手段 7 3 を設けて構成されている。図 1 8 には、表示部 7 2 の表示例を示す。

40

詳しくは、撮像カメラ 4 1 (ラインセンサ) が、例えば、1 0 2 4 ピクセルで約 3 3 0 0 μ m 幅の画像を取り込むものである場合、例えば、この取り込み画像から、3 0 4 ピクセル (幅約 1 0 0 0 μ m) の画像を切り出して、この幅の分が表示される。

また、撮像データ処理部 7 1 は、周端縁表示手段 7 3 によって表示されたウエーハ W の周端縁 S の画像をウエーハ W の周端縁 S の周方向に沿ってスクロールするスクロール手段 7 4 を設けて構成されている。これにより、図 1 8 に示すように、ウエーハ W の周端縁 S の画像がスクロールする。

【 0 0 3 7 】

また、撮像データ処理部 7 1 は、ノッチ撮像部 5 0 の複数の撮像カメラ 5 1 で撮像したノッチ N の画像を表示部 7 2 に同時表示するノッチ表示手段 7 5 を設けて構成されている。

50

図19には、表示画面の一例を示す。

撮像データ処理部71は、表示部72に表示される各撮像カメラ51に対応するノッチNの画像の最適画像範囲を、基準位置を基準にして設定する画像範囲設定手段76を備えて構成されている。

基準位置は、図20及び図21に示すように、基準ウエーハWKを用いて設定される。基準ウエーハWKのノッチNの上面SA及び下面SBには、数ミクロン等間隔の行列状の点のグループで構成され表示部72に表示される表示画面に対する撮像部の位置を判別するための位置判別印77が所定位置に付されており、この位置判別印77を目視により見て、図中の設定画面において設定する。即ち、撮像カメラ51（エリアセンサ）によるノッチNの画像では、焦点の合っている（ピントの合っている）箇所が限定されるところがあることから、範囲設定を行い、焦点の合っていないところは、検出処理をしないようにしている。

10

【0038】

また、撮像データ処理部71は、ウエーハWの周端縁Sの画像データ及びノッチNの画像データから基準にする基準輝度に対して所定以上の輝度差のあるエリアを欠陥部として認識する欠陥部認識手段80と、欠陥部認識手段80が認識した欠陥部を表示部72に座標表示する欠陥部座標表示手段81とを備えて構成されている。

欠陥部座標表示手段81は、ウエーハWの周端縁Sについてはその周方向に沿う角度座標を表示する角度座標表示機能と、ウエーハWの周端縁Sの厚さ方向に沿う相対位置を表示する厚さ方向座標表示機能とを備えて構成されている。

20

詳しくは、ラインセンサは、例えば、1024ピクセルで約3300 μ m幅の画像を取り込むものである場合、例えば、この取り込み画像から、304ピクセル（幅約1000 μ m）の画像を切り出して欠陥抽出の処理を行なう。また、切り出した画像に対して欠陥座標の基準位置（0の位置）を設定する。

【0039】

また、欠陥部座標表示手段81は、ノッチNについては画面毎に基準位置を設定し、その基準位置から欠陥位置を表わす。詳しくは、基準位置は、画面左上からのピクセル数で設定し、欠陥座標は、この基準位置を原点として表わす。

【0040】

更に、撮像データ処理部71は、欠陥部認識手段80が認識した欠陥部の形状を認識する欠陥部形状認識手段82と、欠陥部形状認識手段82が認識した形状を表示部72に表示する欠陥部形状表示手段83とを備えて構成されている。欠陥部形状認識手段82は、図22に示すように、予め定められたしきい値に基づいて点欠陥部、線欠陥部及び面欠陥部のいずれかに区分けして認識する機能を備えて構成されている。

30

詳しくは、欠陥種類の分別は、図23に示すように、欠陥の長さとの幅の比を見て、設定値以下であれば、線欠陥とする。また、図24に示すように、面積が設定値以上であれば、面欠陥とし、設定値以下であれば、点欠陥とする。

【0041】

更にまた、撮像データ処理部71は、欠陥部認識手段80が認識した欠陥部の面積を算出する欠陥部面積算出手段84と、欠陥部面積算出手段84が算出した面積を表示部72に表示する欠陥部面積表示手段85と、欠陥部認識手段80が認識した欠陥部が外接する外接矩形の大きさを算出する欠陥部外接矩形大きさ算出手段86と、欠陥部外接矩形大きさ算出手段86が算出した大きさを表示部72に表示する欠陥部外接矩形大きさ表示手段87とを備えて構成されている。

40

【0042】

また、撮像データ処理部71は、欠陥部面積算出手段84が算出した欠陥部の面積と、欠陥部外接矩形大きさ算出手段86が算出した外接矩形の大きさから欠陥部の密度を算出する欠陥部密度算出手段89と、欠陥部密度算出手段89が算出した欠陥部の密度を表示部72に表示する欠陥部密度表示手段90とを備えて構成されている。

更に、撮像データ処理部71は、欠陥部認識手段80が認識した欠陥部の平均輝度を算出

50

する欠陥部輝度算出手段 9 1 と、欠陥部輝度算出手段 9 1 が算出した平均輝度を表示部 7 2 に表示する欠陥部輝度表示手段 9 2 とを備えて構成されている。

【 0 0 4 3 】

詳しくは、表示部 7 2 には、図 1 8 及び図 1 9 に示すように、ウエーハ W の以下の欠陥情報が表示されることになる。

(1) 欠陥位置 (図 1 8 中 1 2 0)

欠陥形状の重心位置が表示される。

(2) 欠陥座標 (図 1 8 中 1 2 1)

(3) 欠陥種類 (図 1 8 中 1 2 2)

検出した欠陥は、次の様に分類する。

線欠陥：縦と横の長さが大きく異なるもの (判断のための縦横比設定)

面欠陥：面積が大きいもの

点欠陥：線欠陥、面欠陥以外

(4) 面積 欠陥の画素数が表示される (図 1 8 中 1 2 3) 。

(5) 長軸長、短軸長 (図 1 8 中 1 2 4)

欠陥形状の長さ、幅の概略値が表示される。これは、欠陥形状の周囲長 P と面積 A から、次の式が成り立つとして求められる。

形状長さを L、幅を W とすると、周囲長 P は、 $P = 2 * (L + W)$ 、面積 A は、 $A = L * W$ となる。

(6) 欠陥輝度 (図 1 8 中 1 2 5)

欠陥の輝度値を表わす。輝度値は、欠陥の平均輝度になる。

(7) 欠陥密度 (図 1 8 中 1 2 6)

検出した欠陥の外接矩形の面積と、欠陥面積との比を表わす。

【 0 0 4 4 】

更に、撮像データ処理部 7 1 は、欠陥部認識手段 8 0 が認識した欠陥部に基づいて、当該ウエーハ W の良否を判定するウエーハ良否判定手段 9 3 と、ウエーハ良否判定手段 9 3 が判定した当該ウエーハ W の良否を表示部 7 2 に表示するウエーハ良否表示手段 9 4 とを備えて構成されている。即ち、予め定めた欠陥の条件、例えば、欠陥の数、欠陥の大きさ等と実際の検査結果とを比較して、許容範囲内であれば良とし、許容範囲外であれば否と判断し、表示画面の判定表示欄に判定結果を「OK」または「NO」で表示する (図 1 8 中 1 2 7) 。

【 0 0 4 5 】

また、撮像データ処理部 7 1 は、上記種々の欠陥の算出データに基づき、ウエーハ W の周端部の各撮像カメラ 4 1 の撮像面毎に、点欠陥部、線欠陥部及び面欠陥部の程度を所定の角度単位でランク付けする欠陥ランク付け手段 1 0 0 を備えている。図 2 5 に示す表のように、例えば、測定面毎に、ランク分けした各種欠陥の個数を求め、各欠陥の面積でランク分けする。各ランクの設定値は、あらかじめ面積の最大値を設定しておく。ランクは、例えば、1 から 1 0 までの範囲で任意に設定できるようにしておく。ランク 1 が大きい欠陥の分布値を表し、ランク 1 0 が小さい欠陥の分布を表すことになる。

【 0 0 4 6 】

更に、撮像データ処理部 7 1 は、上記種々の欠陥の算出データに基づき、ウエーハ W の周端部の各撮像カメラ 4 1 の撮像面毎に、点欠陥部、線欠陥部及び面欠陥部の分布を所定の角度単位で算出する欠陥分布算出手段 1 0 1 を備えている。図 2 6 に示すように、ランク毎に、欠陥位置における個数の分布を設定角度単位で求める。設定角度は、例えば、 10° 、 15° 、 30° 、 45° 、 60° 、 90° にする。分布は、指定角度値までの個数を表す。例えば、 10° 単位の指定で 90° の欄では、 $80^{\circ} \sim 90^{\circ}$ の範囲の個数を示す。図 2 6 は 10° 単位指定の時の例である。

【 0 0 4 7 】

そして、制御部 7 0 では、これらの欠陥ランク付け手段 1 0 0 及び欠陥分布算出手段 1 0 1 の結果に基づいて、例えば、上記の表示部 7 2 あるいはプリンタ等で図 2 7 及び図 2 8

10

20

30

40

50

に示すような表を出力できるようにしている。

図 27 は、測定面、欠陥種を指定して、各ランクにおける欠陥個数の分布を表示したものである。

図 28 は、測定面、ランクを指定して、欠陥種毎の個数分布を表示したものである。

これにより、円周上にその度数分布を表示することにより、ウエーハの状態がわかりやすく表わされる。

即ち、周端縁 S の欠陥の分布状態や欠陥の程度が分かるので、欠陥の発生原因究明等に利用でき、それだけ、検査精度が向上させられる。

【 0 0 4 8 】

尚、撮像データ処理部 71 においては、図 32 に示すように、ノッチ N と支承盤 13 の支承フィンガ 12 のある部位をマスク設定し、この部分は欠陥抽出処理を行わないようにしている。そのため、ウエーハ W を支承位置可変機構 20 により持ち直して、先に支承フィンガ 12 で邪魔されて撮像できなかった部位を露出させて撮像できるようにしている。従って、ウエーハ W の一周分の撮像データを 2 回取り込むことになり、各撮像データ毎に、上記の表示及び欠陥情報処理等を行なうようにしている。

10

【 0 0 4 9 】

また、撮像データ処理部 71 は、上記各撮像カメラ 41, 51 で撮像された画像データや各算出手段等で算出された結果を検査したウエーハ W の ID 番号に対応させて記憶して格納するデータ格納手段 103 を有している。即ち、検査対象のウエーハ W には固有の ID 番号が付されており、図示外の読み取りセンサでこの ID 番号を読み取って、各データをこの ID 番号に対応させて記憶しておく。このデータ格納手段 103 から必要に応じてデータを読み出して上記の表示部 72 やプリンタ等に出力可能になっている。

20

更に、制御部 70 は、直径測定部 60 が計測した直径を ID 番号に対応させて表示する直径表示手段 104 を備えている。図 29 に示すように、測定点はノッチ N 位置から約 8° 回転したところから測定を開始し、15° 単位で測定をする。そして、例えば、ウエーハ W の直径は mm 単位で 7 桁の固定少数点値で測定する。また、制御部 70 は、直径良否判定手段 105 を備えており、公差内であれば良とし、公差外であれば不良とする。この良否判定結果は、表示部 72 に表示する（図示せず）。

更にまた、表示部 72 の画像表示においては、拡大表示を行なうことができる。

【 0 0 5 0 】

従って、この実施の形態に係るウエーハ用検査装置によれば、予め、撮像カメラ 51 の画像調整を行なっておく。特に、図 19 に示すノッチ画像の画像調整を行なう。図 30 に示すフローチャートを用いて説明すると、この場合、後述のウエーハ搬送部 30 により支持部 10 に基準ウエーハ W K を支承し（1-1）、支承盤 13 を回転させノッチ撮像部 50 で撮像する位置にノッチ N を移動させノッチ N の位置合わせをして（1-2）、ノッチ撮像部 50 でノッチ N の画像を取込む（1-3）。そして、表示部 72 で拡大表示を行なって、ノッチ N の画像の焦点の合っている（ピントの合っている）箇所を、図 20 及び図 21 に示す基準ウエーハ W K に付した位置判別印 77 の行列状の点を目視により見て、この点の位置に合わせて、図 19 に示すように、表示部 72 で表示された範囲設定部 110 において、最適範囲設定を行なう（1-4）。この場合、行列状の点で細かく範囲合わせを行なうことができ、範囲設定が確実に行なわれる。これにより、画像データのデータ処理が、この範囲設定された画像に基づいて行なわれる。そのため、より精度の良い欠陥認識を行なうことができるようになる。

30

40

【 0 0 5 1 】

次に、このように調整されたウエーハ用検査装置を用いてウエーハ W の検査を行なうときは以下のようなになる。図 31 に示すフローチャートを用いて説明する。

まず、検査対象のウエーハ W を支持部 10 に搬送する（2-1）。この搬送は、ウエーハ搬送部 30 によりウエーハ W の貯留部 31 から検査対象のウエーハ W を把持ハンド 33 で取出して行なう。この際、貯留部 31 の取出し位置では、図 10 及び図 11 に示すように、把持ハンド 33 は把持位置 Y a に位置させられ、その係合部 32 をウエーハ W の周端縁

50

Sに係合させ、ウエーハWをウエーハWの面方向に挾持して把持する。この把持により、図11に示すように、係合部32の当接部材36aが板バネ36bの弾性力によってウエーハWに弾接されるので、ウエーハWが中央に求心させられ、支持部10の支承盤13の支承フィンガ12に対してウエーハWが芯出しされる。

そして、ウエーハWを支持部10の支承盤13に搬送し、図1及び図2、図7及び図9、図33(a)に示すように、所定位置で把持ハンド33を把持解除位置Ybに位置させ、ウエーハWの把持を解除して支承盤13に支承する(2-2)。この場合、支承盤13の支承フィンガ12に対してウエーハWが芯出しされているので、支承盤13に対するウエーハWの位置決め精度が高くなり、その後の検査精度が向上させられる。また、ウエーハWは支承フィンガ12に支承され、しかも、支承フィンガ12の斜めの支承面17で線支持されるので、ウエーハWの面を傷つける等悪影響を及ぼす事態が防止される。

【0052】

次に、図32に示すように、支承盤13を回転させノッチ撮像部50で撮像する位置にノッチNを移動させノッチNの位置合わせをする(2-3)。この状態で、ウエーハWのID番号を図示外の読み取りセンサで読み取る(2-4)。そして、ノッチ撮像部50でノッチNの画像を取込む(2-5)。取り込まれた撮像データは撮像データ処理部71に送出されて処理される(2-6)。

この場合、ノッチ撮像部50は、図1、図2及び図14に示すように、ノッチNの側面SS、上面SA及び下面SBに対応し各面に対して撮像方向を略直角に対面させて夫々配置された撮像カメラ51を備え、即ち、ノッチNの底部Ntの側面SSに対応した底部側面撮像カメラ51(SS(Nt))、底部Ntの上面SAに対応した底部上面撮像カメラ51(SA(Nt))、底部Ntの下面SBに対応した底部下面撮像カメラ51(SB(Nt))、ノッチNの一方の側部Naの側面SSに対応した一方側部側面撮像カメラ51(SS(Na))、ノッチNの他方の側部Nbの側面SSに対応した他方側部側面撮像カメラ51(SS(Nb))を備えているので、ノッチNが面取りされていても、撮像カメラ51の位置を逐一移動させることなく、厚さ方向全部を明瞭にしかも同時に撮像でき、操作性が向上させられるとともに、撮像精度が向上させられる。また、撮像カメラ51は、エリアセンサなので、ウエーハWを回転させることなく一時に撮像できる。

また、この場合、ノッチNを照明するノッチ照明部52が、ドーム照射体54及び平面照射体56を備え、ノッチNを良く照明するとともに、各撮像カメラ51は、ノッチ照明部52からの照明光が反射した反射光の明視野範囲に位置するように配置されているので、ノッチNの各面を明瞭に撮像でき、特に、欠陥を良く撮像でき、この点でも撮像精度が向上させられる。

【0053】

ウエーハWのノッチNの撮像が終了すると、次に、周端縁Sの撮像が行なわれる。まず、ウエーハWを回転させて(2-7)、周端縁撮像部40で周端縁Sの画像を取込む(2-8)。取り込まれた撮像データは撮像データ処理部71に送出されて処理される(2-9)。尚、撮像データ処理部71においては、図32に示すように、ノッチNと支承盤13の支承フィンガ12のある部位をマスク設定し、この部分は欠陥抽出処理を行わないようにしている。

この場合、周端縁撮像部40は、図1、図2、図14乃至図16に示すように、ウエーハWの周端縁Sの側面SS、上面SA及び下面SBに対応し各面に対して撮像方向を略直角に対面させて夫々配置した側面用撮像カメラ41(SS)、上面用撮像カメラ41(SA)及び下面用撮像カメラ41(SB)を備えているので、ウエーハWの周端縁Sが面取りされていても、撮像カメラ41の位置を逐一移動させることなく、厚さ方向全部を明瞭にしかも同時に撮像でき、操作性が向上させられるとともに、撮像精度が向上させられる。また、撮像カメラ41はラインセンサなので、周端縁Sを狭い幅で撮像してこれを連続させるので、解像度が良く、この点でも撮像精度が向上させられる。

また、この場合、周端縁Sを照明する周端縁照明部42は、ウエーハWの周端縁Sの厚さ方向に沿う所定の円弧に沿って照射面を形成し円弧の中心に向けて収束するように照射光

10

20

30

40

50

を放光し、各撮像カメラ41は、周端縁照明部42からの照明光が反射した反射光の明視野範囲に位置するように配置されているので、即ち、各撮像カメラ41は、C型の周端縁照明部42からの照明を正反射で受けるよう配置されているので、周端縁Sの各面を明瞭に撮像でき、特に、欠陥を良く撮像でき、この点でも撮像精度が向上させられる。

【0054】

次に、各撮像カメラ41は支承盤13の支承フィンガ12のある部位を撮像できないので、支承位置可変機構20により、支承盤13の支承フィンガ12に支承されたウエーハWの支承位置を変える(2-10)。これは、図33(a)に示すように、受渡位置Xbにある担持盤23を、図33(b)に示すように、担持位置Xaに移動させる。これにより、支承盤13に支承されていたウエーハWが、担持盤23の担持フィンガ22に担持されて持ち上げられる。そして、図33(c)に示すように、この持ち上げられている間に、支承盤13を回転させて支承盤13の支承フィンガ12を別の角度位相位置に位置させる。それから、図33(d)に示すように、担持盤23を受渡位置Xbに位置させてウエーハWを支承フィンガ12に受け渡す。この場合、支承位置を変えるので、先に撮像できなかった部位を露出させて撮像できるようにすることができる。また、ウエーハWを担持盤23の担持フィンガ22に担持させて持ち上げるので、ウエーハWに傷をつける等の悪影響を及ぼす事態が防止される。

【0055】

この状態で、再び、ウエーハWを回転させて(2-11)、周端縁撮像部40で周端縁Sの画像を取込む(2-12)。取り込まれた撮像データは撮像データ処理部71に送出されて処理される(2-13)。尚、撮像データ処理部71においては、図32に示すように、ノッチNと支承盤13の支承フィンガ12のある部位をマスク設定し、この部分は欠陥抽出処理を行わないようにしている。

この場合も、周端縁撮像部40は、ウエーハWの周端縁Sの側面SS、上面SA及び下面SBに対応し各面に対して撮像方向を略直角に対面させて夫々配置した側面用撮像カメラ41(SS)、上面用撮像カメラ41(SA)及び下面用撮像カメラ41(SB)を備えているので、ウエーハWの周端縁Sが面取りされていても、撮像カメラ41の位置を逐一移動させることなく、厚さ方向全部を明瞭にしかも同時に撮像でき、操作性が向上させられるとともに、撮像精度が向上させられる。

また、この場合も、周端縁Sを照明する周端縁照明部42は、ウエーハWの周端縁Sの厚さ方向に沿う所定の円弧に沿って照射面を形成し円弧の中心に向けて収束するように照射光を放光し、各撮像カメラ41は、周端縁照明部42からの照明光が反射した反射光の明視野範囲に位置するように配置されているので、即ち、各撮像カメラ41は、C型の周端縁照明部42からの照明を正反射で受けるよう配置されているので、周端縁Sの各面を明瞭に撮像でき、特に、欠陥を良く撮像でき、この点でも撮像精度が向上させられる。

【0056】

それから、ウエーハWの直径を直径測定部60で測定する(2-15)。図29に示すように、直径測定部60は、相対向して設けられた一对の光センサがウエーハWの周端縁Sの位置を検知し、検知した周端縁Sの位置から直径を計測する。測定点はノッチNの位置から約8°回転したところから測定を開始し、15°単位で測定をする。そして、例えば、ウエーハWの直径はmm単位で7桁の固定少数点値で測定する。ウエーハWの直径検査が欠陥検査と同時に行われるので、検査効率が向上させられる。

【0057】

その後、ウエーハWを取出し元のウエーハWの貯留部31に搬送する。この搬送は、ウエーハ搬送部30により支持部10の支承盤13上のウエーハWを把持ハンド33で把持して取出し、貯留部31に搬送する。

そして、再び、ウエーハ搬送部30によりウエーハWの貯留部31から次の検査対象のウエーハWを把持ハンド33で取出して、支持部10に搬送し、上記と同様の処理を行なう。

【0058】

10

20

30

40

50

次に、制御部 70 のデータ処理について説明する。

先ず、撮像データ処理部 71 においては、図 17 に示すように、欠陥部認識手段 80 が、ウエーハ W の周端縁 S の画像データ及びノッチ N の画像データから基準にする基準輝度に対して所定以上の輝度差のあるエリアを欠陥部として認識する。

これにより、欠陥部形状認識手段 82 が、欠陥部認識手段 80 が認識した欠陥部の形状を認識する。この認識は、図 22 乃至図 24 に示すように、予め定められたしきい値に基づいて点欠陥部、線欠陥部及び面欠陥部のいずれかに区分けして認識する。

また、欠陥部面積算出手段 84 が、欠陥部認識手段 80 が認識した欠陥部の面積を算出し、欠陥部外接矩形大きさ算出手段 86 が、欠陥部認識手段 80 が認識した欠陥部が外接する外接矩形の大きさを算出する。これに基づいて、欠陥部密度算出手段 89 が、欠陥部面積算出手段 84 が算出した欠陥部の面積と欠陥部外接矩形大きさ算出手段 86 が算出した外接矩形の大きさから欠陥部の密度を算出する。

更に、欠陥部輝度算出手段 91 が欠陥部認識手段 80 が認識した欠陥部の平均輝度を算出する。

【 0059 】

更に、撮像データ処理部 71 は、ウエーハ良否判定手段 93 が、欠陥部認識手段 80 が認識した欠陥部に基づいて、当該ウエーハ W の良否を判定する。判定は、予め定めた欠陥の条件、例えば、欠陥の数、欠陥の大きさ等と実際の検査結果とを比較して、許容範囲内であれば良とし、許容範囲外であれば否と判断する。また、撮像データ処理部 71 のデータ格納手段 103 に、各撮像カメラ 41、51 で撮像された画像データや各算出手段等で算出された結果を検査したウエーハ W の ID 番号に対応させて記憶して格納する。

更に、直径良否判定手段 105 により、ウエーハ W の直径が公差内であるか否かを判定し、あれば良とし、公差外であれば不良とする。

更にまた、欠陥ランク付け手段 100 が種々の欠陥の算出データに基づき、ウエーハ W の周端部の各撮像カメラ 41 の撮像面毎に、点欠陥部、線欠陥部及び面欠陥部の程度を所定の角度単位でランク付けする。

また、欠陥分布算出手段 101 が、種々の欠陥の算出データに基づき、ウエーハ W の周端部の各撮像カメラ 41 の撮像面毎に、点欠陥部、線欠陥部及び面欠陥部の分布を所定の角度単位で算出する。

【 0060 】

そして、これらの各データについての表示が行なわれる（図 31（2-16））。ウエーハ W の ID 番号を指定することにより、図 18 に示すように、該当するウエーハ W の周端縁 S に係る画面表示と、図 19 に示すように、該当するウエーハ W のノッチ N に係る画面表示とを行なうことができる。

先ず、図 18 に示すように、ウエーハ W の周端縁 S に係る表示画面においては、1 回目の撮像に係るデータと、2 回目の撮像に係るデータとを選択的に表示できる。ここでは、周端縁表示手段 73 が、周端縁撮像部 40 の複数の撮像カメラ 41 で撮像したウエーハ W の周端縁 S をウエーハ W の角度位置の位相を合わせて表示部 72 に同時表示する。このウエーハ W の周端縁 S の画像は、スクロール手段 74 によって、ウエーハ W の周端縁 S の周方向に沿ってスクロール可能になっている。

詳しくは、ウエーハ W の周端縁 S の側面 S S、上面 S A 及び下面 S B に対応した画像が、3 つ揃うように並べて表示される。スクロールバー 111 を操作すると、3 つの画面が揃って移動する。また、角度位置表示欄 112 に右端、左端、中央の角度位置が表示される。

【 0061 】

このウエーハ W の周端縁 S の撮像画面により、周端面の面の状況、特に欠陥部の状況が視認できる。この場合、各面に対して撮像方向を略直角に対面させて夫々配置した側面用撮像カメラ 41（S S）、上面用撮像カメラ 41（S A）及び下面用撮像カメラ 41（S B）によって撮像しているので、ウエーハ W の周端縁 S が面取りされていても各面を明瞭に視認することができ、それだけ、検査精度が向上させられる。また、スクロールして画像

10

20

30

40

50

を見ることができるので、全体に亘って良く視認することができ、それだけ、検査精度が向上させられる。

また、各撮像カメラ41は、C型の周端縁照明部42からの照明を正反射で受けるよう配置されているので、周端縁Sを明瞭に撮像でき、特に、欠陥を良く撮像でき、この点でも各面を明瞭に視認することができ、それだけ、検査精度が向上させられる。

【0062】

一方、図19に示すように、ウエーハWのノッチNに係る表示画面においては、ノッチ表示手段75が、ノッチ撮像部50の複数の撮像カメラ51で撮像したウエーハWのノッチNの画像を表示部72に同時表示する。詳しくは、ノッチNの底部Ntの側面SS、底部Ntの上面SA、底部Ntの下面SB、ノッチNの一方の側部Na、Nbの側面SS、ノッチNの他方の側部Na、Nbの側面SSに対応した画像が、表示される。この場合、画像範囲設定手段76によって、各撮像カメラ51に対応するノッチNの画像の最適画像範囲が指定されているので、各画像の相対位置関係が容易に分かる。

10

【0063】

このノッチNの撮像画面により、ノッチNの面の状況、特に欠陥部の状況が視認できる。この場合、ノッチNの底部Ntの側面SSに対応した底部側面撮像カメラ51(SS(Nt))、底部Ntの上面SAに対応した底部上面撮像カメラ51(SA(Nt))、底部Ntの下面SBに対応した底部下面撮像カメラ51(SB(Nt))、ノッチNの一方の側部Na、Nbの側面SSに対応した一方側部側面撮像カメラ51(SS(Na))、ノッチNの他方の側部Na、Nbの側面SSに対応した他方側部側面撮像カメラ51(SS(Nb))によって撮像しているので、ノッチNが面取りされていても各面を明瞭に視認することができ、それだけ、検査精度が向上させられる。

20

また、各撮像カメラ51は、ノッチ照明部52からの照明光が反射した反射光の明視野範囲に位置するように配置されているので、ノッチNを明瞭に撮像でき、特に、欠陥を良く撮像でき、この点でも各面を明瞭に視認することができ、それだけ、検査精度が向上させられる。

【0064】

また、図18に示すウエーハWの周端縁Sに係る画面表示及び図19に示すウエーハWのノッチNに係る画面表示に共通して、各種データ欄が設けられている。

先ず、欠陥部座標表示手段81が欠陥部認識手段80が認識した欠陥部を表示部72に座標表示する。欠陥部座標表示手段81は、ウエーハWの周端縁Sについてはその周方向に沿う角度座標を表示するとともに、ウエーハWの周端縁Sの厚さ方向に沿う相対位置を表示する。欠陥の位置を特定できるので、それだけ表示が確実になり、検査精度も向上させられる。

30

また、欠陥部座標表示手段81は、ノッチNについては画面毎に基準位置を設定し、その基準位置から欠陥位置を表わす。基準位置は、画面左上からのピクセル数で設定され、欠陥座標は、この基準位置を原点として表わされる。欠陥の位置を特定できるので、それだけ表示が確実になり、検査精度も向上させられる。

【0065】

更に、欠陥部形状表示手段83が、欠陥部形状認識手段82が認識した形状を表示部72に表示する。図18及び図19に示すように、点欠陥部、線欠陥部及び面欠陥部のいずれかに区分けして表示する。欠陥の形状が分かるので、それだけ検査精度が向上させられる。また、欠陥の種類が分類されるので、認識が容易になる。

40

更にまた、欠陥部面積表示手段85が、欠陥部面積算出手段84が算出した面積を表示部72に表示する。欠陥の大きさが認識でき、それだけ、検査精度が向上させられる。

また、欠陥部外接矩形大きさ表示手段87が、欠陥部外接矩形大きさ算出手段86が算出した大きさを表示部72に表示する。具体的には、欠陥形状の長さ(長軸)と、幅(短軸)の概略値が表される。欠陥の大きさが認識でき、それだけ、検査精度が向上させられる。

そしてまた、欠陥部密度表示手段90が、欠陥部密度算出手段89が算出した欠陥部の密

50

度を表示部 7 2 に表示する。欠陥の広がりを認識でき、それだけ、検査精度が向上させられる。

また、欠陥部輝度表示手段 9 2 が、欠陥部輝度算出手段 9 1 が算出した欠陥部の平均輝度を表示部 7 2 に表示する。欠陥の輝度は欠陥の深さに対応することから、欠陥の奥行きを認識でき、それだけ、検査精度が向上させられる。

【 0 0 6 6 】

更に、ウエーハ良否表示手段 9 4 が、ウエーハ良否判定手段 9 3 が判定したウエーハ W の良否を表示部 7 2 に表示する。判定が良ければ「OK」と表示され、悪ければ「NO」と表示される。ウエーハ W の良否を自動的に判定できるので、検査が容易になる。

更にまた、直径表示手段 1 0 4 により、図示外の表示部 7 2 に直径測定部 6 0 が計測した直径が ID 番号に対応させて表示される。また、直径が公差内であれば良とし、公差外であれば不良として、図示外の表示部 7 2 に表示される。

また、必要に応じ、欠陥ランク付け手段 1 0 0 及び欠陥分布算出手段 1 0 1 の結果に基づいて、例えば、表示部 7 2 あるいはプリンタ等で図 2 7 及び図 2 8 に示すような表を出力する。これにより、円周上にその度数分布を表示することにより、ウエーハの状態がわかりやすく表わされる。即ち、周端縁 S の欠陥の分布状態や欠陥の程度が分かるので、欠陥の発生原因究明等に利用でき、それだけ、検査精度が向上させられる。

【 0 0 6 7 】

尚、上記実施の形態では、ノッチ N を有したウエーハ W を検査対象としているが、必ずしもこれに限定されるものではなく、オリフラを有したウエーハ W にも適用できる。ただし、この場合には、ノッチ撮像部 5 0 をオリフラ撮像用に適宜変更する等すれば良い。

尚また、上記実施の形態では、撮像カメラ全部を使用して撮像しているが、必ずしもこれに限定されるものではなく、必要に応じて、1 つあるいは 2 以上の適宜の数の撮像カメラを使用して撮像することもでき、撮像条件に応じて適宜変更して良い。

【 0 0 6 8 】

【 発明の効果 】

以上説明したように、本発明のウエーハ用検査装置によれば、ウエーハの周端縁撮像部を、ウエーハの周端縁の厚さ方向の異なる部位を撮像する複数の撮像カメラを配置して構成したので、複数の撮像カメラがウエーハの周端縁の厚さ方向の異なる部位を撮像することから、ウエーハの周端縁が面取りされていても、撮像カメラの位置を逐一移動させることなく、厚さ方向全部を明瞭にしかも同時に撮像でき、操作性を向上させることができるとともに、撮像精度を向上させることができる。

【 0 0 6 9 】

そして、撮像カメラをラインセンサで構成した場合には、周端縁を狭い幅で撮像してこれを連続させることができ、解像度が良く、撮像精度を向上させることができる。

また、ウエーハの周端縁がウエーハの面に対して略直角な側面、この側面に対して傾斜して面取りされた上面及び下面を備えて構成された場合、側面、上面及び下面に対応し各面に対して撮像方向を略直角に対面させて夫々配置した側面用撮像カメラ、上面用撮像カメラ及び下面用撮像カメラを備えた場合には、ウエーハの周端縁の各面を明瞭にしかも同時に撮像でき、操作性を向上させることができるとともに、撮像精度を向上させることができる。

【 0 0 7 0 】

更に、各撮像カメラを、各撮像カメラの撮像部位がウエーハの周端縁の同じ位相位置を撮像し得るように配置した場合には、撮像カメラを集約できるので、装置をコンパクトにすることができる。

この構成において、ウエーハの周端縁を照明する周端縁照明部を設け、この周端縁照明部を、ウエーハの周端縁の厚さ方向に沿う所定の円弧に沿って照射面を形成し該円弧の中心に向けて収束するように照射光を放光する光ファイバの集合体を備えて構成するとともに、各撮像カメラが周端縁照明部からの照明光が反射した反射光の明視野範囲に位置するように配置した場合には、各撮像カメラは、C 型の周端縁照明部からの照明を正反射で受け

10

20

30

40

50

るよう配置されているので、周端縁の各面を明瞭に撮像でき、特に、欠陥を良く撮像でき、この点でも撮像精度を向上させることができる。

【0071】

また、制御部の撮像データ処理部を、周端縁撮像部の複数の撮像カメラで撮像したウエーハの周端縁をウエーハの角度位置の位相を合わせて表示部に同時表示する周端縁表示手段を設けて構成した場合には、周端面の面の状況、特に欠陥部の状況を視認できる。特に、複数の撮像カメラでウエーハの周端縁の厚さ方向の異なる部位を撮像しているため、ウエーハの周端縁が面取りされていても各面を明瞭にしかも各面同時に視認することができ、それだけ、検査精度を向上させることができる。

更に、撮像データ処理部をウエーハの周端縁の画像をスクロールするスクロール手段を設けて構成した場合には、画像をスクロールすることで、全周に亘って良く視認することができ、それだけ、検査精度を向上させることができる。

10

【0072】

更にまた、撮像データ処理部を、所定以上の輝度差のあるエリアを欠陥部として認識する欠陥部認識手段と、この認識した欠陥部を表示部に座標表示する欠陥部座標表示手段とを備えて構成した場合には、欠陥部の位置を特定できるので、それだけ、検査精度を向上させることができる。

この場合、欠陥部座標表示手段を、ウエーハの周端縁の周方向に沿う角度座標を表示する角度座標表示機能と、ウエーハの周端縁の厚さ方向に沿う相対位置を表示する厚さ方向座標表示機能とを備えて構成した場合には、表示が確実になる。

20

【0073】

また、撮像データ処理部を、欠陥部認識手段が認識した欠陥部の形状を認識する欠陥部形状認識手段と、この形状を表示部に表示する欠陥部形状表示手段とを備えて構成した場合には、欠陥の形状が分かるので、それだけ、検査精度を向上させることができる。

この場合、欠陥部形状認識手段を、予め定められたしきい値に基づいて点欠陥部、線欠陥部及び面欠陥部のいずれかに区分けして認識する機能を備えて構成すれば、欠陥の種類が分類されるので、認識を容易にすることができる。

また、この場合、各撮像カメラの撮像面毎に、点欠陥部、線欠陥部及び面欠陥部の分布を所定の角度単位で算出する欠陥分布算出手段を備えた構成とすれば、周端縁の欠陥の分布状態が分かるので、欠陥の発生原因究明等に利用でき、それだけ、検査精度を向上させることができる。

30

更に、この場合、各撮像カメラの撮像面毎に、点欠陥部、線欠陥部及び面欠陥部の程度を所定の角度単位でランク付けする欠陥ランク付け手段を備えた構成とすれば、周端縁の欠陥の程度が分かるので、欠陥の発生原因究明等に利用でき、それだけ、検査精度を向上させることができる。

【0074】

更にまた、撮像データ処理部を、欠陥部の面積を算出する欠陥部面積算出手段と、この面積を表示部に表示する欠陥部面積表示手段と、欠陥部が外接する外接矩形の大きさを算出する欠陥部外接矩形大きさ算出手段と、この大きさを表示部に表示する欠陥部外接矩形大きさ表示手段とを備えて構成した場合には、欠陥の大きさを認識でき、それだけ、検査精度を向上させることができる。

40

また、撮像データ処理部を、欠陥部の面積と外接矩形の大きさから欠陥部の密度を算出する欠陥部密度算出手段と、この欠陥部の密度を表示部に表示する欠陥部密度表示手段とを備えて構成した場合には、欠陥の広がりを認識でき、それだけ、検査精度を向上させることができる。

更に、撮像データ処理部を、欠陥部の平均輝度を算出する欠陥部輝度算出手段と、この欠陥部の平均輝度を表示部に表示する欠陥部輝度表示手段とを備えて構成した場合には、欠陥部の輝度は欠陥の深さに対応することから、欠陥の奥行きを認識でき、それだけ、検査精度を向上させることができる。

更にまた、撮像データ処理部を、ウエーハの良否を判定するウエーハ良否判定手段と、こ

50

のウエー八の良否を表示部に表示するウエー八良否表示手段とを備えて構成した場合には、ウエー八の良否を自動的に判定できるので、検査を容易にすることができる。

【0075】

そして、本発明において対象とするウエー八は、その周端縁に底部及び両側部を有して略U字状に切り欠かれたノッチがあるウエー八であり、本発明は、ノッチを撮像するノッチ撮像部を設け、このノッチ撮像部を、ノッチの厚さ方向の異なる部位を撮像する複数の撮像カメラを配置した構成にしたことから、複数の撮像カメラでノッチの厚さ方向の異なる部位を撮像するので、ノッチが面取りされていても、撮像カメラの位置を逐一移動させることなく、厚さ方向全部を明瞭にしかも同時に撮像でき、操作性を向上させることができるとともに、撮像精度を向上させることができる。

10

【0076】

また、撮像カメラを面状に撮像するエリアセンサで構成した場合には、ウエー八を回転させることなく、一時に撮像できる。

そしてまた、ノッチがウエー八の面に対して略直角な側面、この側面に対して傾斜して面取りされた上面及び下面を備えて構成された場合、撮像カメラを、側面、上面及び下面に対応し各面に対して撮像方向を略直角に対面させて夫々配置した構成とした場合には、ノッチの各面を明瞭にしかも同時に撮像でき、操作性を向上させることができるとともに、撮像精度を向上させることができる。

この場合、ノッチの底部の側面に対応した底部側面撮像カメラ、底部の上面に対応した底部上面撮像カメラ、底部の下面に対応した底部下面撮像カメラ、ノッチの一方の側部の側面に対応した一方側部側面撮像カメラ、ノッチの他方の側部の側面に対応した他方側部側面撮像カメラを備えた場合には、ノッチの各面を明瞭にしかも同時に撮像でき、操作性を向上させることができるとともに、撮像精度を向上させることができる。

20

【0077】

また、ノッチを照明するノッチ照明部を設け、ノッチ照明部を、ノッチに向けて照射光を放光する発光ダイオードの集合体を備えて構成するとともに、各撮像カメラがノッチ照明部からの照明光が反射した反射光の明視野範囲に位置するように配置した場合には、ノッチ照明部からの照明光が反射した反射光の明視野範囲に位置するように配置されているので、ノッチの各面を明瞭に撮像でき、特に、欠陥を良く撮像でき、この点でも撮像精度を向上させることができる。

30

更に、ノッチ照明部を、底部上面撮像カメラ及び底部下面撮像カメラに夫々設けられ各撮像カメラの撮像面が中央に臨むドーム状の照射面を形成しノッチに向けて照射光を放光するドーム照射体と、底部側面撮像カメラ、一方側部側面撮像カメラ及び他方側部側面撮像カメラの撮像面が臨むスリットを形成するように設けられた略平面状の照射面を一对有しノッチに向けて照射光を放光する平面照射体とを備えて構成した場合には、ノッチを照明するノッチ照明部が、ドーム照射体及び平面照射体を備え、ノッチを良く照明するとともに、各撮像カメラは、ノッチ照明部からの照明光が反射した反射光の明視野範囲に位置するように配置されているので、ノッチの各面を明瞭に撮像でき、特に、欠陥を良く撮像でき、この点でも撮像精度を向上させることができる。

【0078】

そして、制御部の撮像データ処理部を、ノッチ撮像部の複数の撮像カメラで撮像したノッチの画像を表示部に同時表示するノッチ表示手段を設けて構成した場合には、ノッチの面の状況、特に欠陥部の状況が視認できる。この場合、複数の撮像カメラでノッチの厚さ方向の異なる部位を撮像しているので、ノッチが面取りされていても各面を明瞭にしかも各面同時に視認することができ、それだけ、検査精度を向上させることができる。

40

また、撮像データ処理部を、表示部に表示される各撮像カメラに対応するノッチの画像の最適画像範囲を、基準位置を基準にして設定する画像範囲設定手段を備えて構成した場合には、画像データのデータ処理が、この範囲設定された画像に基づいて行なわれる。そのため、より精度の良い欠陥認識を行なうことができるようになる。

この場合、基準位置を、各撮像カメラに対応してノッチの表面に行列状の点を付した基準

50

ウエー八を撮像し、この撮像画面の行列状の点に基づいて決定すれば、ノッチ撮像部で基準ウエー八のノッチの画像を取込み、ノッチ画像の焦点の合っている（ピントの合っている）箇所を、基準ウエー八に付した行列状の点を目視により見て、この点の位置に合わせて、最適範囲設定を行なうことができ、そのため、行列状の点で細かく範囲合わせを行なうことができ、範囲設定を確実に行なうことができるようになる。

【 0 0 7 9 】

また、撮像データ処理部を、ノッチの撮像画像において、所定以上の輝度差のあるエリアを欠陥部として認識する欠陥部認識手段と、この欠陥部を表示部に座標表示する欠陥部座標表示手段とを備えて構成した場合には、欠陥部の位置を特定できるので、それだけ、検査精度を向上させることができる。

10

そして、このノッチの画像処理においても、上記の周端部と同様に撮像データ処理部を構成すれば、同様の効果が得られる。

即ち、撮像データ処理部を、欠陥部形状認識手段が認識した形状を表示部に欠陥部形状表示手段で表示する構成にした場合には、欠陥の形状が分かるので、それだけ、検査精度を向上させることができる。

この場合、欠陥部形状認識手段を、予め定められたしきい値に基づいて点欠陥部、線欠陥部及び面欠陥部のいずれかに区分けして認識する機能を備えて構成すれば、欠陥の種類が分類されるので、認識が容易になる。

【 0 0 8 0 】

更にまた、撮像データ処理部を、欠陥部面積算出手段が算出した欠陥部の面積を欠陥部面積表示手段で表示部に表示し、欠陥部外接矩形大きさ算出手段が算出した欠陥部が外接する外接矩形の大きさを欠陥部外接矩形大きさ表示手段で表示部に表示する構成にした場合には、欠陥の大きさを認識でき、それだけ、検査精度を向上させることができる。

20

また、撮像データ処理部を、欠陥部の面積と外接矩形の大きさから欠陥部の密度を算出する欠陥部密度算出手段と、この欠陥部の密度を表示部に表示する欠陥部密度表示手段とを備えて構成した場合には、欠陥の広がりを認識でき、それだけ、検査精度を向上させることができる。

更に、撮像データ処理部を、欠陥部輝度算出手段が算出した欠陥部の平均輝度を欠陥部輝度表示手段で表示部に表示する構成とした場合には、欠陥部の輝度は欠陥の深さに対応することから、欠陥の奥行きを認識でき、それだけ、検査精度を向上させることができる。

30

更にまた、上記撮像データ処理部を、ウエー八の良否を判定するウエー八良否判定手段と、このウエー八の良否を表示部に表示するウエー八良否表示手段とを備えて構成した場合には、ウエー八の良否を自動的に判定できるので、検査が容易になる。

【 0 0 8 1 】

そして、支持部を、中心軸を回転中心として回転可能に設けられ中心軸を中心とする円周上にウエー八の周端縁を支承する複数の支承フィンガを備えた支承盤と、支承盤を回転させる駆動部とを備えて構成した場合には、ウエー八が支承フィンガに支承されるので、ウエー八の面を傷つける等悪影響を及ぼす事態を防止することができる。

この場合、支承フィンガを、中心軸側に向けて下に傾斜するウエー八の周端縁を支承する支承面を備えて構成すれば、ウエー八の周端縁を支承面で線支持するようになるので、より一層ウエー八の面を傷つける等悪影響を及ぼす事態を防止することができる。

40

【 0 0 8 2 】

また、支持部を、ウエー八の支承位置を可変にする支承位置可変機構を備えて構成した場合には、支承位置を変えるので、支承フィンガのある撮像できないウエー八の部位を露出させて撮像できるようにすることができる。

この場合、支承位置可変機構を、担持フィンガを支承盤の支承フィンガより上位の位置であってウエー八を担持して持ち上げる担持位置及び支承フィンガより下位の位置であってウエー八を支承フィンガに受け渡す受渡位置の2位置に移動可能な担持盤と、担持盤を担持位置及び受渡位置の2位置に移動させる移動機構とを備えて構成した場合には、ウエー八の支承位置を変えることができるので、先に撮像できなかった部位を露出させて撮像で

50

きるようにすることができる。また、ウエー八を担持盤の担持フィンガに担持させて持ち上げるので、ウエー八に傷をつける等の悪影響を及ぼす事態を防止することができる。

【0083】

更に、ウエー八の貯留部から検査対象のウエー八を搬送して支持部の支承盤の支承フィンガにウエー八を芯出しして支承させるウエー八搬送部を備えた場合には、支承盤の支承フィンガに対してウエー八が芯出しされて支承されるので、支承盤に対するウエー八の位置決め精度が高くなり、その後の検査精度を向上させることができる。

この場合、ウエー八搬送部を、ウエー八の周端縁に係合する係合部を係合させてウエー八を挾持して把持する把持位置及び把持を解除する把持解除位置の2位置に相対移動可能な一对の把持ハンドを備えて構成し、係合部に把持位置でウエー八に弾接する弾接体を設けた構成とした場合には、係合部の弾接体がウエー八に弾接されるので、ウエー八が中央に求心させられ、支持部の支承盤の支承フィンガに対してウエー八を容易に芯出しすることができる。

10

そして、支持部に支持されて回転させられるウエー八の直径を計測する直径計測部を設けた場合には、ウエー八の直径検査を欠陥検査と同時に行なうことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置を示す斜視図である。

【図2】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置を示す要部斜視図である。

【図3】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置を示す正面図である。

【図4】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置を示す左側面図である。

20

【図5】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置を示す平面図である。

【図6】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置を示す背面図である。

【図7】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置の支持部を示す正面図である。

【図8】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置の支持部を示す平面図である。

【図9】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置の支持部において支承盤の支承フィンガを示す拡大図である。

【図10】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置のウエー八搬送部を示し、(a)は平面図、(b)は正面図である。

【図11】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置のウエー八搬送部の係合部を示す拡大斜視図である。

30

【図12】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置が検査するウエー八の周端縁の構造を示す図である。

【図13】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置が検査するウエー八のノッチの構造を示し、(a)は平面図、(b)は正面図である。

【図14】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置のウエー八に対する撮像カメラの配置関係を示す図であり、(a)は平面図、(b)は正面図である。

【図15】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置の周端縁撮像部と周端縁照明部との関係を示す斜視図である。

【図16】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置の周端縁撮像部と周端縁照明部との関係を示す側面図である。

40

【図17】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置において制御部の撮像データ処理部の構成を示すブロック図である。

【図18】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置の表示部における周端縁の撮像データ表示画面を示す図である。

【図19】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置の表示部におけるノッチの撮像データ表示画面を示す図である。

【図20】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置においてノッチの撮像画像の位置調整用の基準ウエー八を示す図であり、(a)はノッチの平面図、(b)はノッチの正面図である。

【図21】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置においてノッチの撮像画像の位

50

置調整用の基準ウエー八に付された行列状の点を示す図である。

【図 2 2】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置の欠陥部形状認識手段が認識する欠陥の形態を示し、(a) は点欠陥部、(b) は線欠陥部、(c) は面欠陥部を示す図である。

【図 2 3】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置の欠陥部形状認識手段が認識する線欠陥部の判断手法を示す図である。

【図 2 4】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置の欠陥部形状認識手段が認識する点欠陥部及び面欠陥部の判断手法を示す図である。

【図 2 5】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置の欠陥ランク付け手段の手法を示す表図である。

10

【図 2 6】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置の欠陥分布算出手段の手法を示す表図である。

【図 2 7】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置の欠陥ランク付け手段及び欠陥分布算出手段の結果をウエー八との関係で表示する表示例を示す図である。

【図 2 8】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置の欠陥ランク付け手段及び欠陥分布算出手段の結果をウエー八との関係で表示する別の表示例を示す図である。

【図 2 9】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置の直径計測部のウエー八に対する計測手法を示す図である。

【図 3 0】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置においてノッチの撮像画像の位置調整時の手順を示すフローチャートである。

20

【図 3 1】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置においてウエー八の検査の手順を示すフローチャートである。

【図 3 2】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置の支持部でのウエー八の支持位置状態を示す図である。

【図 3 3】本発明の実施の形態に係るウエー八用検査装置の支持部においてウエー八の支承位置を可変にする状態を示す工程図である。

【図 3 4】従来ウエー八用検査装置の一例を示す図である。

【符号の説明】

W ウエー八

S 周端縁

S S 側面

S A 上面

S B 下面

N ノッチ

N t 底部

N a 側部

N b 側部

1 0 支持部

1 1 基台

1 2 支承フィンガ

1 3 支承盤

1 3 a 中心軸

1 4 モータ

1 5 ベルト伝導機構

1 6 駆動部

1 7 支承面

2 0 支承位置可変機構

2 2 担持フィンガ

X a 担持位置

X b 受渡位置

30

40

50

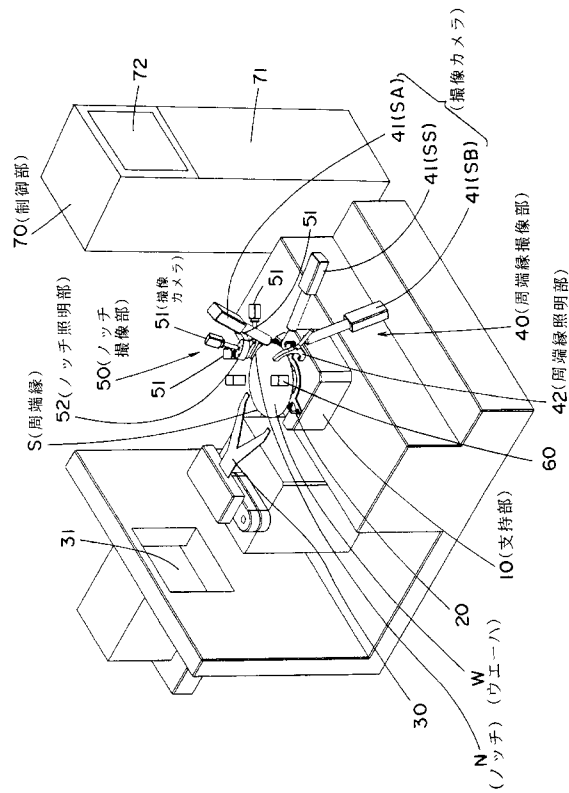
2 3	担持盤	
2 4	エアシリンダ装置	
2 5	移動機構	
2 6	支承面	
3 0	ウエーハ搬送部	
3 1	貯留部	
3 2	係合部	
Y a	把持位置	
Y b	把持解除位置	
3 3	把持ハンド	10
3 4	支持面部	
3 5	規制面部	
3 6	弾接体	
3 6 a	当接部材	
3 6 b	板バネ	
3 7	エアシリンダ装置	
4 0	周端縁撮像部	
4 1	撮像カメラ	
4 1 (S S)	側面用撮像カメラ	
4 1 (S A)	上面用撮像カメラ	20
4 1 (S B)	下面用撮像カメラ	
4 2	周端縁照明部	
4 3	光ファイバ	
5 0	ノッチ撮像部	
5 1	撮像カメラ	
5 1 (S S (N t))	底部側面撮像カメラ	
5 1 (S A (N t))	底部上面撮像カメラ	
5 1 (S B (N t))	底部下面撮像カメラ	
5 1 (S S (N a))	一方側部側面撮像カメラ	
5 1 (S S (N b))	他方側部側面撮像カメラ	30
5 2	ノッチ照明部	
5 4	ドーム照射体	
5 5	スリット	
5 6	平面照射体	
6 0	直径測定部	
6 1	光センサ	
7 0	制御部	
7 1	撮像データ処理部	
7 2	表示部	
7 3	周端縁表示手段	40
7 4	スクロール手段	
7 5	ノッチ表示手段	
7 6	画像範囲設定手段	
7 7	位置判別印	
8 0	欠陥部認識手段	
8 1	欠陥部座標表示手段	
8 2	欠陥部形状認識手段	
8 3	欠陥部形状表示手段	
8 4	欠陥部面積算出手段	
8 5	欠陥部面積表示手段	50

- 8 6 欠陥部外接矩形大きさ算出手段
- 8 7 欠陥部外接矩形大きさ表示手段
- 8 9 欠陥部密度算出手段
- 9 0 欠陥部密度表示手段
- 9 1 欠陥部輝度算出手段
- 9 2 欠陥部輝度表示手段
- 9 3 ウエーハ良否判定手段
- 9 4 ウエーハ良否表示手段
- 1 0 0 欠陥ランク付け手段
- 1 0 1 欠陥分布算出手段
- 1 0 3 データ格納手段
- 1 0 4 直径表示手段
- 1 0 5 直径良否判定手段
- 1 1 1 スクロールバー
- 1 1 2 角度位置表示欄
- 1 2 0 欠陥位置
- 1 2 1 欠陥座標
- 1 2 2 欠陥種類
- 1 2 3 面積
- 1 2 4 長軸長、短軸長
- 1 2 5 欠陥輝度
- 1 2 6 欠陥密度

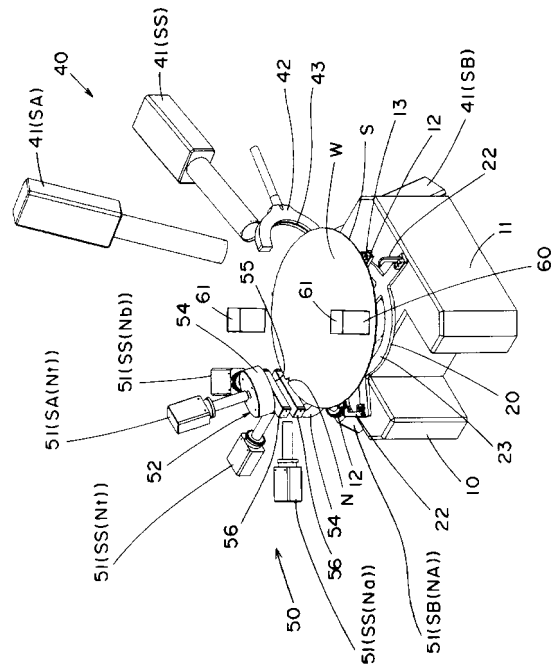
10

20

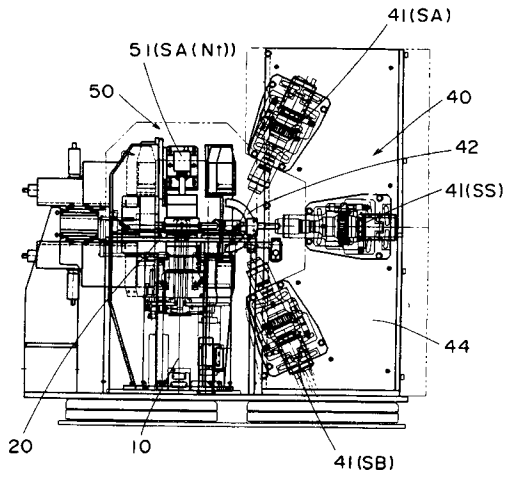
【 図 1 】



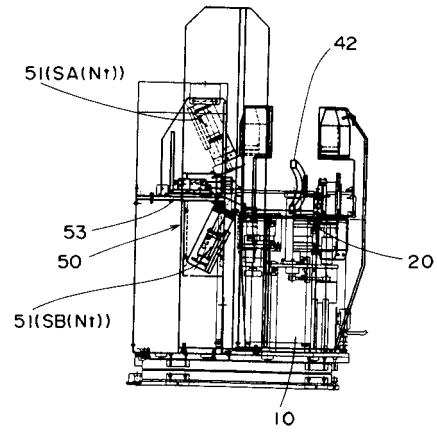
【 図 2 】



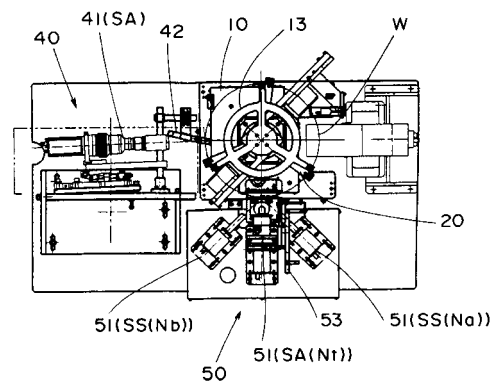
【 図 3 】



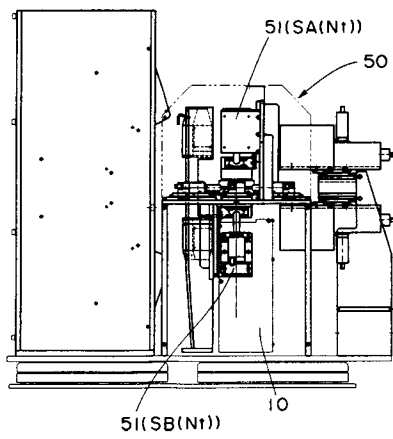
【 図 4 】



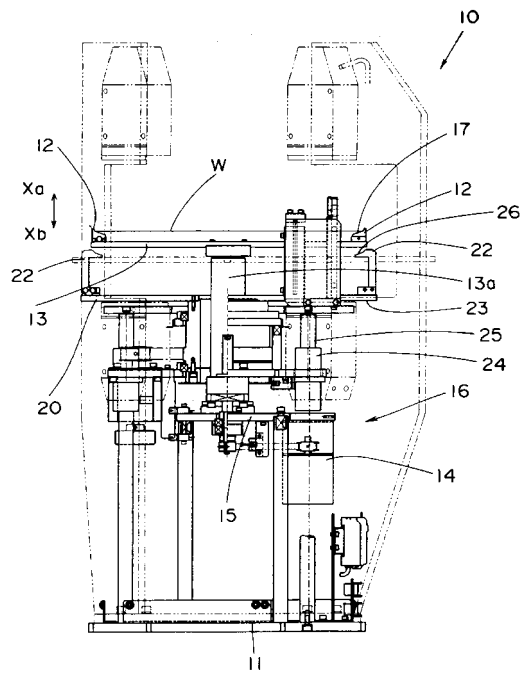
【 図 5 】



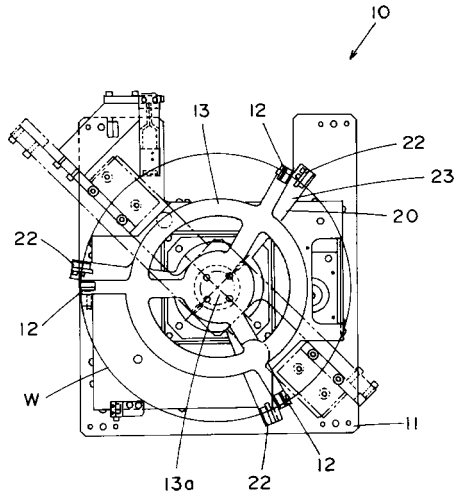
【 図 6 】



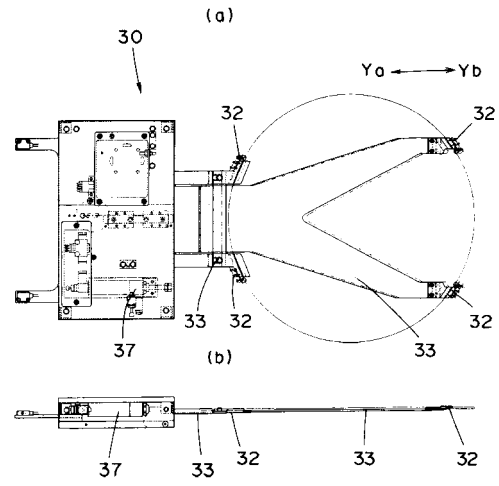
【 図 7 】



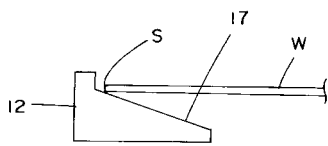
【図8】



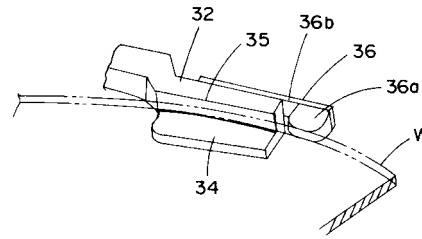
【図10】



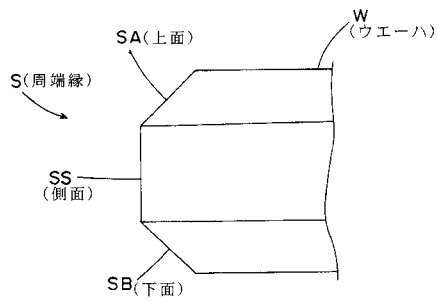
【図9】



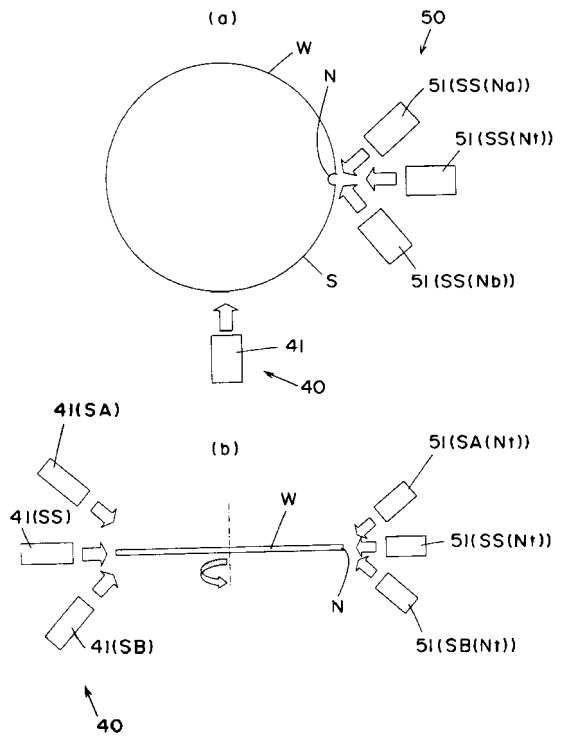
【図11】



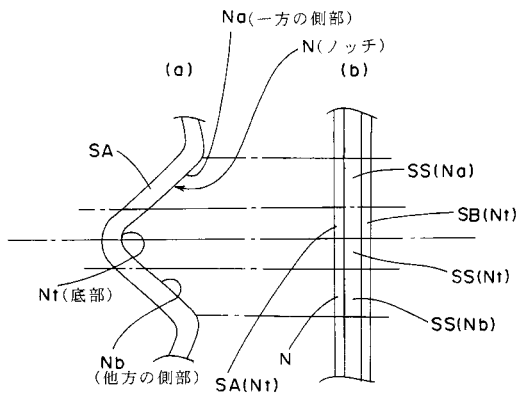
【図12】



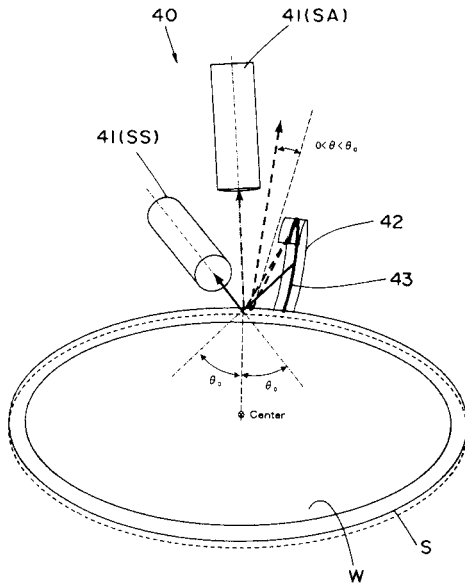
【図14】



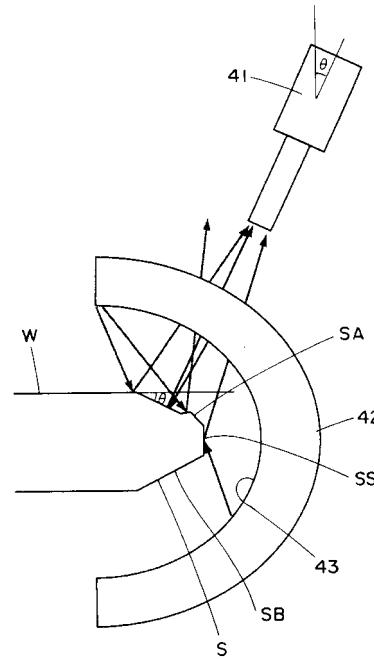
【図13】



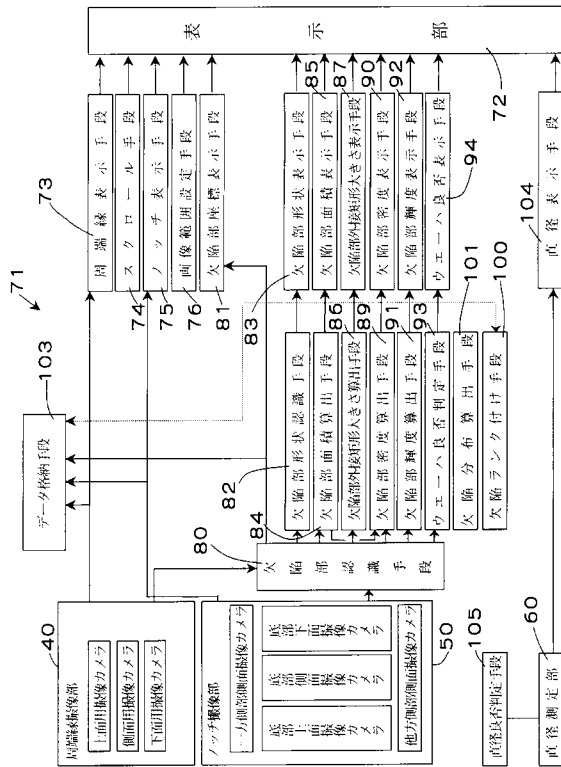
【図15】



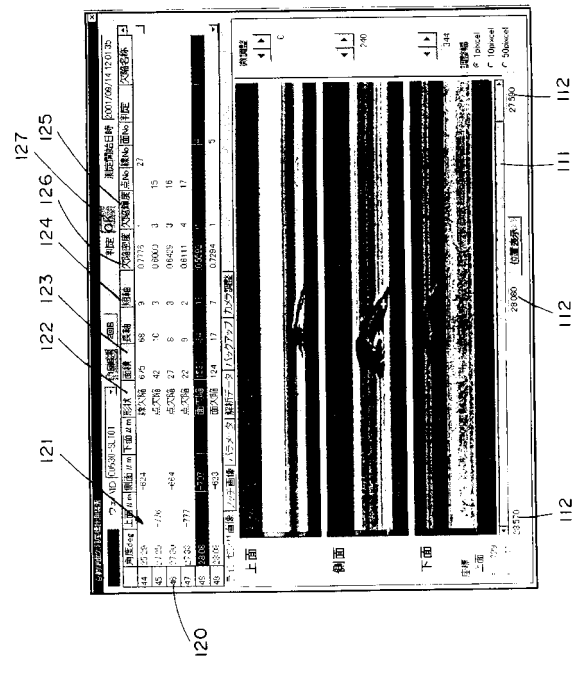
【図16】



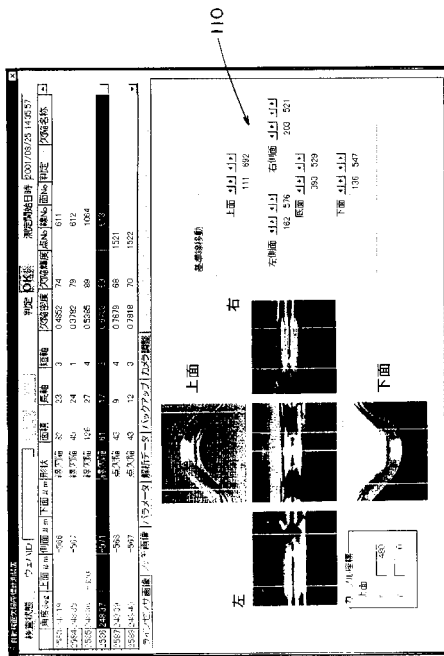
【図17】



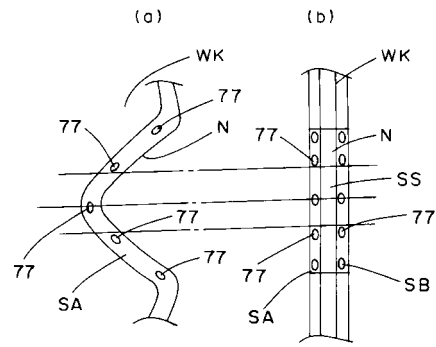
【図18】



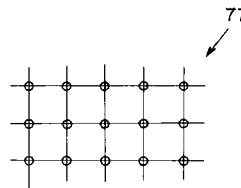
【図19】



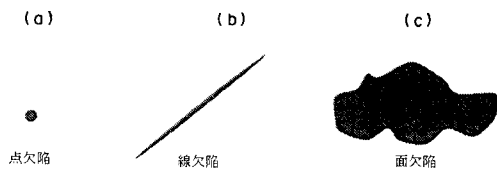
【図20】



【図21】



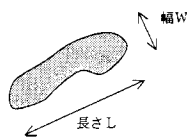
【図22】



【図25】

	ランク	線欠陥	点欠陥	面欠陥
上部	1			
	2			
	3			
	10			
側部	1			
	2			
	3			
	10			
下部	1			
	2			
	3			
	10			
ノッチ部	1			
	2			
	3			
	10			

【図23】

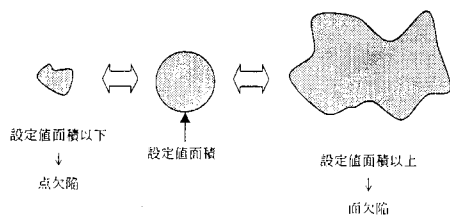


【図26】

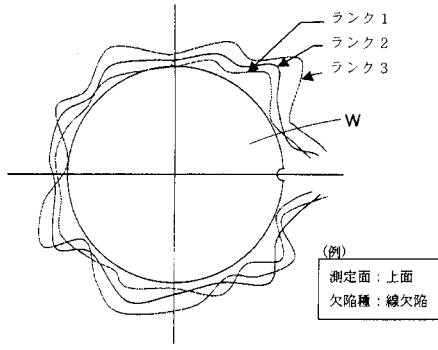
ランク1	角度(deg)	線欠陥	点欠陥	面欠陥
上部	0			
	10			
	20			
	350			
側部	0			
	10			
	20			
	350			
下部	0			
	10			
	20			
	350			
ノッチ部	左			
	右			
	上			
	下			

ランク2	角度(deg)	線欠陥	点欠陥	面欠陥
	0			

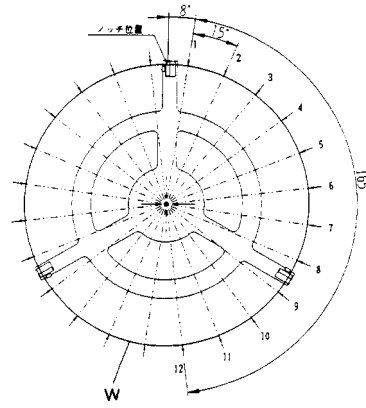
【図24】



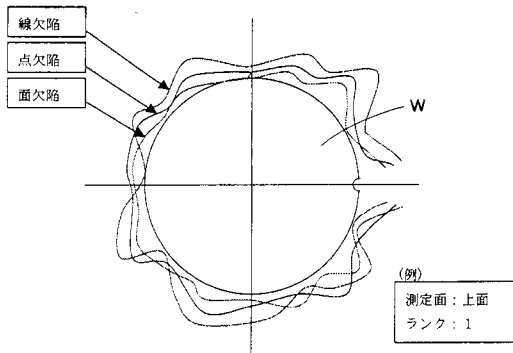
【図 27】



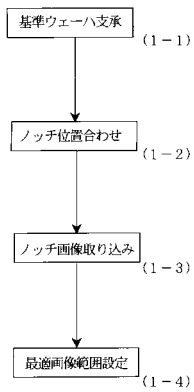
【図 29】



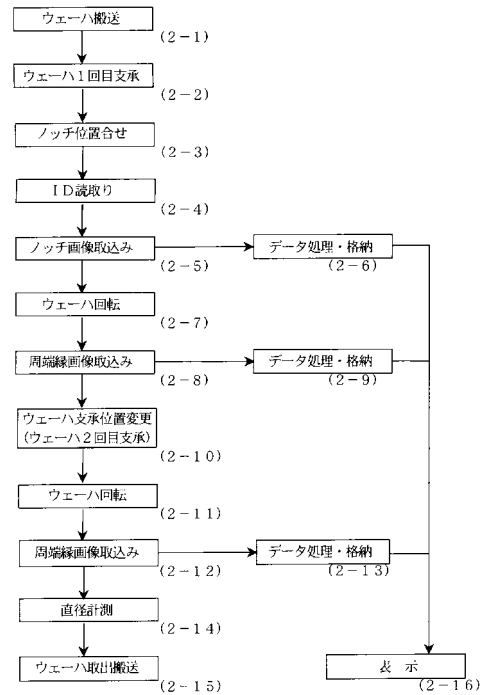
【図 28】



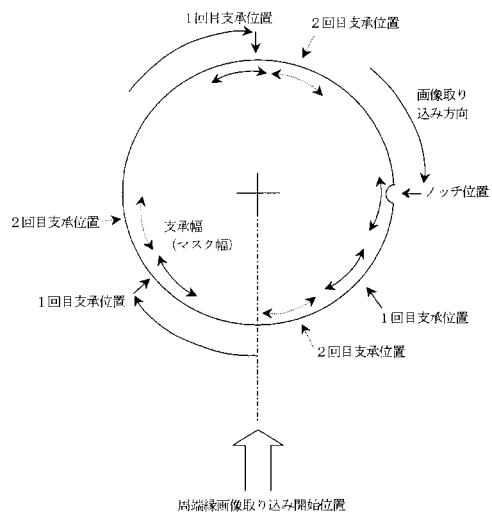
【図 30】



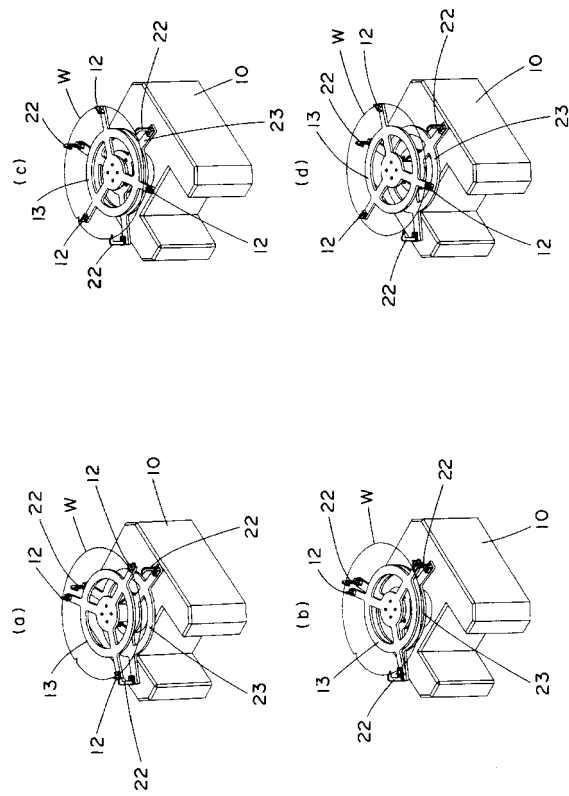
【図 31】



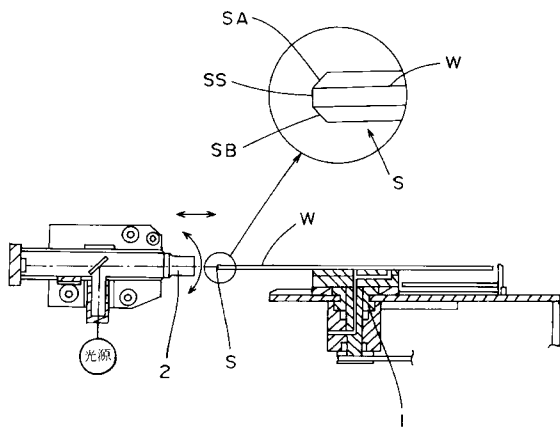
【 図 3 2 】



【 図 3 3 】



【 図 3 4 】



フロントページの続き

- (72)発明者 遊田 博明
東京都中央区日本橋本町1丁目8番16号 本多エレクトロン株式会社内
- (72)発明者 田邊 淳
新潟県北蒲原郡聖籠町東港6-861-5 新潟東芝セラミックス株式会社内
- (72)発明者 磯貝 宏道
新潟県北蒲原郡聖籠町東港6-861-5 新潟東芝セラミックス株式会社内
- (72)発明者 泉妻 宏治
新潟県北蒲原郡聖籠町東港6-861-5 新潟東芝セラミックス株式会社内

審査官 坂本 薫昭

- (56)参考文献 特開2001-337046(JP,A)
特開2001-250754(JP,A)
特開2001-249016(JP,A)
特開2001-223196(JP,A)
特開2001-221749(JP,A)
特開2001-209798(JP,A)
特開2001-189358(JP,A)
特開2001-156141(JP,A)
特開2001-004341(JP,A)
特開2000-294619(JP,A)
特開2000-114329(JP,A)
特開平11-281337(JP,A)
特開平10-289319(JP,A)
特開平10-239025(JP,A)
特開平10-135288(JP,A)
特開平10-074816(JP,A)
特開平10-038539(JP,A)
特開平10-038539(JP,A)
特開平05-240628(JP,A)
特表2002-540388(JP,A)
国際公開第01/041068(WO,A1)

(58)調査した分野(Int.Cl.⁷, DB名)

H01L 21/66